

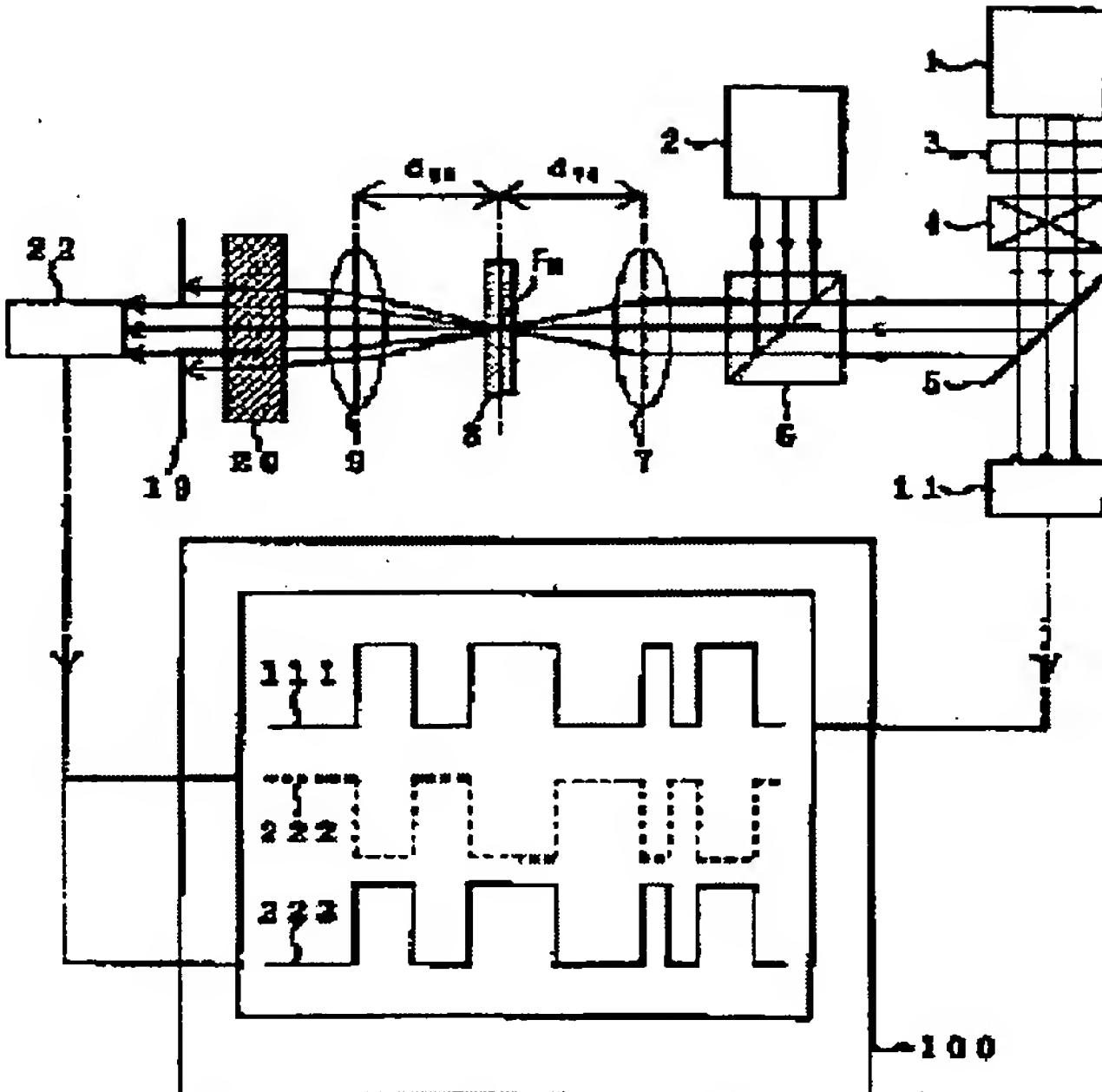
## LIGHT CONTROL METHOD AND ITS DEVICE

**Patent number:** JP10090733  
**Publication date:** 1998-04-10  
**Inventor:** TANAKA NORIO; TAKARADA SHIGERU;  
YANAGIMOTO HIROMITSU; KAI MASAKATSU; UENO  
ICHIRO  
**Applicant:** DAINICHISEIKA COLOR & CHEM MFG CO LTD;;  
VICTOR CO OF JAPAN LTD  
**Classification:**  
- **International:** G02F1/17  
- **European:**  
**Application number:** JP19960239314 19960910  
**Priority number(s):**

### Abstract of JP10090733

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To extract a photo responsiveness of ample magnitude and speed from a photo responsive optical element with a good reproducibility.

**SOLUTION:** Light sources 1, 2 emit control light and signal light respectively. These kinds of light are converged by a condenser lens 7 to irradiate an optical cell 8 packed with photo responsive liquid composition, only the signal light is detected by a photodetector 22 through a light receiving lens 9 and a wavelength selection transmission filter 20. The on/off action of the control light increases/decreases reversibly the transmission factor and/or refractivity of the signal light to realize the intensity modulation of the signal light. By setting the numeral aperture of the light receiving lens 9 at a value substantially smaller than that of the condenser lens 7, the light response of ample magnitude and photo responsiveness can be extracted from a light responsive liquid composition including a dyestuff packed in the optical cell 8.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-90733

(43)公開日 平成10年(1998)4月10日

(51)Int.Cl.<sup>6</sup>

G 0 2 F 1/17

識別記号

F I

G 0 2 F 1/17

審査請求 未請求 請求項の数16 O.L (全 18 頁)

(21)出願番号 特願平8-239314

(22)出願日 平成8年(1996)9月10日

(71)出願人 000002820

大日精化工業株式会社

東京都中央区日本橋馬喰町1丁目7番6号

(71)出願人 000004329

日本ピクター株式会社

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地

(72)発明者 田中 教雄

東京都足立区堀之内1丁目9番4号 大日精化工業株式会社東京製造事業所内

(74)代理人 弁理士 石田 純 (外2名)

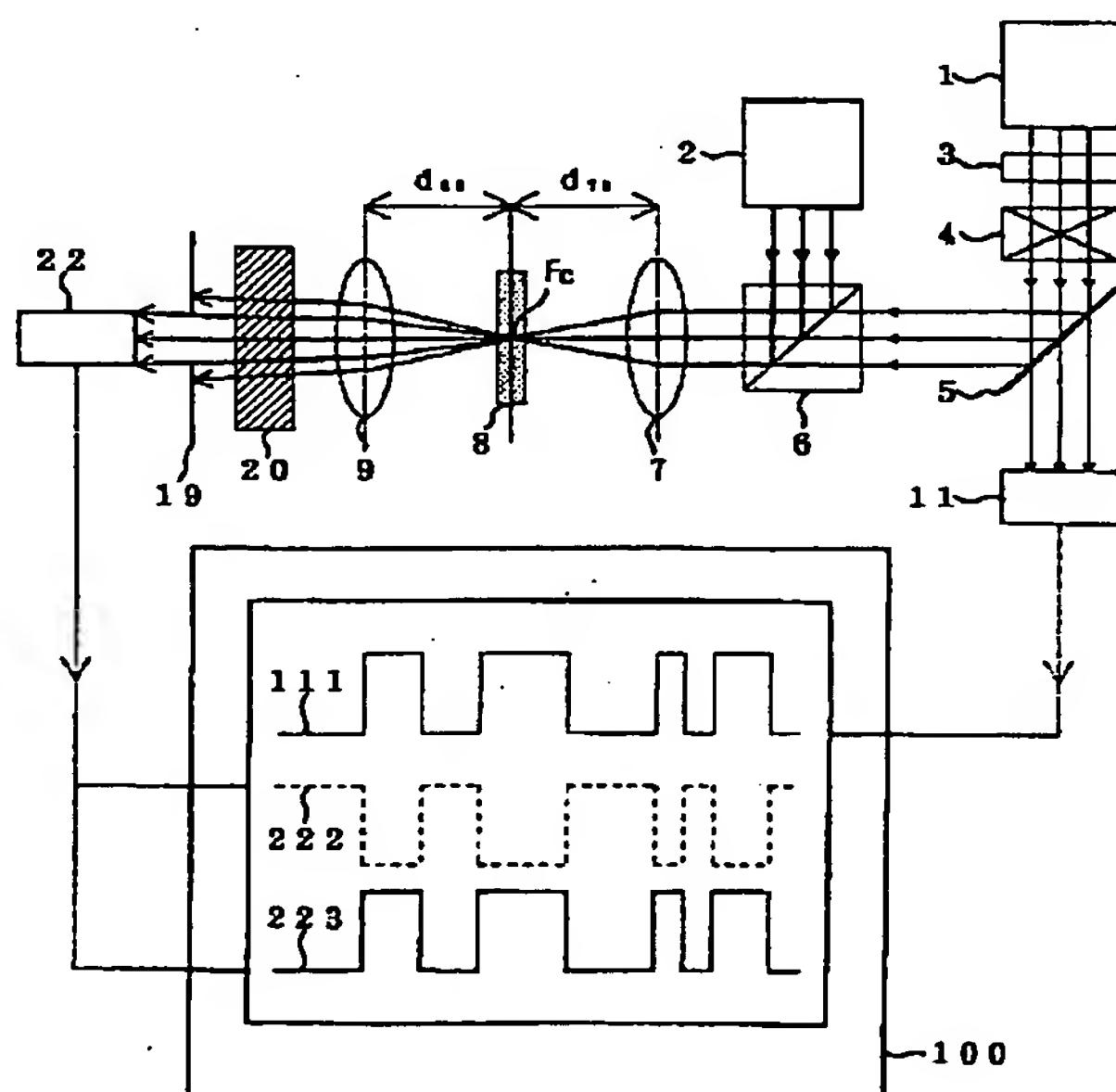
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 光制御方法および光制御装置

(57)【要約】

【課題】 充分な大きさおよび速度の光応答を再現性良く光応答性の光学素子から引き出すような光制御方法および光制御装置を提供する。

【解決手段】 光源1から制御光が、光源2から信号光が射出する。制御光および信号光は集光レンズ7で収束され、液状の光応答性組成物が充填された光学セル8に照射される。受光レンズ9および波長選択透過フィルター20を経て光検出器22で信号光のみが検出される。制御光のON、OFFにより信号光の透過率および/または屈折率が可逆的に増減し、信号光の強度変調が実現する。受光レンズの開口数を集光レンズの開口数よりも実質的に小さく設定することにより、充分な大きさおよび速度の光応答を、光学セル8中に充填された色素を含有する液状の光応答性組成物から引き出すことが可能となる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 液状の光応答性組成物を充填した光学セルに、前記光応答性組成物が感応する波長の制御光を照射し、制御光とは異なる波長帯域にある信号光の透過率および／または屈折率を可逆的に変化させることにより前記光学セルを透過する前記信号光の強度変調および／または光束密度変調を行う光制御方法であって、

前記制御光および前記信号光を各々収束させて前記光学セルへ照射し、かつ、前記制御光および前記信号光のそれぞれの焦点近傍の光子密度が最も高い領域が前記光学セル内の前記光応答性組成物中において互いに重なり合うように、前記制御光および前記信号光の光路をそれぞれ配置したことを特徴とする光制御方法。

【請求項2】 請求項1記載の光制御方法において、前記制御光および前記信号光を前記光学セル中において実質的に同一光路で伝搬させることを特徴とする光制御方法。

【請求項3】 請求項1または2記載の光制御方法において、

前記光学セル中の前記光応答性組成物を透過した後、発散していく信号光光線束のうち、前記強度変調および／または光束密度変調を強く受けた領域の信号光光線束を分別して取り出すことを特徴とする光制御方法。

【請求項4】 請求項1または2記載の光制御方法において、

前記光学セル中の前記光応答性組成物を透過した後、発散していく信号光光線束を、前記信号光光線束の発散角度よりも小さい角度範囲（開口角）で取り出すことによって、前記強度変調および／または光束密度変調を強く受けた領域の信号光光線束を分別して取り出すことを特徴とする光制御方法。

【請求項5】 請求項1から4のいずれかに記載の光制御方法において、

前記制御光および前記信号光のそれぞれの焦点位置と前記光学セルとの位置関係を変化させることにより、前記制御光の照射によって、前記光学セルを透過した前記信号光の見かけの強度が減少する方向の光応答と、前記信号光の見かけの強度が増大する光応答との、どちらか一方を選択して取り出すことを特徴とする光制御方法。

【請求項6】 請求項1から5のいずれかに記載の光制御方法において、

前記液状光応答性組成物が色素を含有することを特徴とする光制御方法。

【請求項7】 液状の光応答性組成物を充填した光学セルに、前記光応答性組成物が感応する波長の制御光を照射し、制御光とは異なる波長帯域にある信号光の透過率および／または屈折率を可逆的に増減させることにより前記光学セルを透過する前記信号光の強度変調および／または光束密度変調を行う光制御方法に用いられる光制

御装置であって、

前記制御光および前記信号光を各々収束させる収束手段を有し、収束された前記制御光および前記信号光のそれぞれの焦点近傍の光子密度が最も高い領域が互いに重なり合うように、前記制御光および前記信号光の光路をそれぞれ配置し、かつ、前記光学セル内の前記液状光応答性組成物は、収束された前記制御光および前記信号光のそれぞれの焦点近傍の光子密度が最も高い領域が互いに重なり合う位置に配置されていることを特徴とする光制御装置。

【請求項8】 請求項7記載の光制御装置において、前記制御光および前記信号光が前記光学セル中において実質的に同一光路で伝搬するような光路配置を有することを特徴とする光制御装置。

【請求項9】 請求項7または8記載の光制御装置において、

前記光学セル中の前記光応答性組成物を透過した後、発散していく信号光光線束のうち、前記強度変調および／または光束密度変調を強く受けた領域の信号光光線束を分別して取り出す手段を有することを特徴とする光制御装置。

【請求項10】 請求項9記載の光制御装置において、前記強度変調および／または光束密度変調を強く受けた領域の信号光光線束を分別して取り出す手段として、前記光学セルへ前記信号光を収束させて入射させる際に用いた収束手段の開口数よりも小さい開口数の収束手段を用いることを特徴とする光制御装置。

【請求項11】 請求項9記載の光制御装置において、前記強度変調および／または光束密度変調を強く受けた領域の信号光光線束を分別して取り出す手段として、絞りを用いることを特徴とする光制御装置。

【請求項12】 請求項7から11のいずれかに記載の光制御装置において、

前記制御光および前記信号光のそれぞれの焦点位置と前記光学セルとの位置関係を変化させる移動手段を有し、前記移動手段を用いることによって、前記制御光および前記信号光のそれぞれの焦点位置と前記光学セルとの位置関係を変化させることにより、前記制御光の照射によって前記光学セルを透過した前記信号光の見かけの強度が減少する方向の光応答と、前記信号光の見かけの強度が増大する光応答との、どちらか一方を選択して取り出すことを特徴とする光制御装置。

【請求項13】 請求項7から12のいずれかに記載の光制御装置において、

前記光学セル中の前記光応答性組成物を透過してきた信号光と制御光の混合光を、信号光と制御光とに分離する手段を有することを特徴とする光制御装置。

【請求項14】 請求項7から13のいずれかに記載の光制御装置において、

前記制御光および前記信号光を各々収束させる前記収束

手段、および／または前記光学セル中の前記光応答性組成物を透過した後、発散していく信号光光線束のうち、前記強度変調および／または光束密度変調を強く受けた領域の信号光光線束を分別して取り出す手段、および／または前記光学セル中の前記光応答性組成物を透過してきた信号光と制御光の混合光を、信号光と制御光とに分離する手段が、前記光学セルに組み込まれた構造を有することを特徴とする光制御装置。

【請求項15】 請求項7から14のいずれかに記載の光制御装置において、前記液状光応答性組成物が揮発性溶剤を含有することを特徴とする光制御装置。

【請求項16】 請求項7から15のいずれかに記載の光制御装置において、前記液状光応答性組成物が色素を含有することを特徴とする光制御装置。

#### 【発明の詳細な説明】

##### 【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、例えば光通信、光情報処理などの光エレクトロニクスおよびフォトニクスの分野において有用な、液状の光応答性組成物を充填した光学セルを用いる光制御方法および光制御装置に関するものである。

##### 【0002】

【従来の技術】 超高速情報伝達・処理を目的として、光の多重性、高密度性に着目した光エレクトロニクスおよびフォトニクスの分野において、光学材料または光学組成物を加工して作成した光学素子に光を照射することで引き起こされる透過率や屈折率の変化を利用して、電子回路技術を用いずに、光の強度（振幅）または周波数（波長）を変調しようとする光・光制御方法の研究開発が盛んに進められている。また、光の特徴を活かして、並列光論理演算や画像処理を行おうとする場合、光ビーム（光線束）の断面に光強度分布変化など、何等かの変調を行うための「空間光変調器」が極めて重要であり、ここへも光・光制御方法の適用が期待される。

【0003】 光・光制御方法への応用が期待される現象としては可飽和吸収、非線形屈折、フォトリフラークティブ効果などの非線形光学効果、およびフォトクロミック現象が広く注目を集めている。

【0004】 一方、第一の波長帯域の光で励起された分子が、分子構造の変化を伴わずに、第一の波長帯域とは異なる第二の波長帯域において新たに光吸収を起こす現象も知られており、これを「励起状態吸収」または「誘導吸収」、あるいは「過渡吸収」と呼ぶことができる。

【0005】 励起状態吸収の応用を試みた例としては、例えば、特開昭53-137884号公報に、ポルフィリン系化合物と電子受容体を含んだ溶液または固体に対して波長の異なる少なくとも二種類の光線を照射し、この照射により一方の波長の光線が有する情報を他方の光

線の波長に移すような光変換方法が開示されている。また、特開昭55-100503号公報および特開昭55-108603号公報にはポルフィリン誘導体などの有機化合物の基底状態と励起状態の間の分光スペクトルの差を利用し、励起光の時間的な変化に対応して伝搬光を選択するような機能性の液体コア型光ファイバーが開示されている。また、特開昭63-89805号公報には光によって励起された三重項状態から更に上位の三重項状態への遷移に対応する吸収を有するポルフィリン誘導体などの有機化合物をコア中に含有しているプラスチック光ファイバーが開示されている。また、特開昭63-236013号公報にはクリプトシアニンなどのシアニン色素の結晶に第一の波長の光を照射して分子を光励起した後、第一の波長とは異なる第二の波長の光を前記分子に照射し、第一の波長の光による光励起状態によって第二の波長の光の透過または反射をスイッチングするような光機能素子が開示されている。また、特開昭64-73326号公報にはポルフィリン誘導体などの光誘起電子移動物質をマトリックス材料中に分散した光変調媒体に第一および第二の波長の光を照射して、分子の励起状態と基底状態の間の吸収スペクトルの差を利用して光変調するような光信号変調媒体が開示されている。

【0006】 これら従来技術で用いられている光学装置の構成としては、特開昭55-100503号公報、特開昭55-108603号公報、および特開昭63-89805号公報には伝搬光の伝播する光ファイバーを励起光の光源（例えばフラッシュランプ）の周囲に巻きつけるような装置構成が開示されており、特開昭53-137884号公報および特開昭64-73326号公報には光応答性光学素子内部の信号光に相当する光の伝播している部分全体に信号光の光路とは別の方から制御光に相当する光を収束させることなくむしろ投射レンズなどの手段によって発散させて照射するような装置構成が開示されている。

##### 【0007】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、以上のような従来技術においては、実用に足りる大きさの透過率変化または屈折率変化（光応答）を引き起こすためには非常に高密度の光パワーを必要としたり、光照射に対する応答が遅かったり、光応答材料の耐久性が低かったりするため、実用に至るものは未だ得られていないのが現状である。

【0008】 本出願人は、上記従来技術の有する課題を解消し、できる限り低い光パワーで充分な大きさおよび速度の光応答を光応答性の光学素子から引き出すような光制御方法および光制御装置に関する発明（特願平7-25618号、8-151133号）および光応答性材料に関する発明（特願平7-58413号、7-58414号）を提案した。

【0009】 本発明は、上記課題を解決し、更に、上記

本出願人の上記出願を一層改良した、光応答を充分な大きさで再現性良く得るための光制御方法および光制御装置を提供することを目的とする。

【0010】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するためには、本願の請求項1記載の発明に係る光制御方法は、液状の光応答性組成物を充填した光学セルに、前記光応答性組成物が感応する波長の制御光を照射し、制御光とは異なる波長帯域にある信号光の透過率および/または屈折率を可逆的に増減させることにより前記光学セルを透過する前記信号光の強度変調および/または光束密度変調を行う光制御方法であって、前記制御光および前記信号光を各々収束させて前記光学セルへ照射し、かつ、前記制御光および前記信号光のそれぞれの焦点近傍の光子密度が最も高い領域が前記光学セル内の前記光応答性組成物中において互いに重なり合うように、前記制御光および前記信号光の光路をそれぞれ配置したことを特徴とする。

【0011】更に、上記目的を達成するために、本願の請求項2記載の発明に係る光制御方法は、請求項1記載の光制御方法において、前記制御光および前記信号光を前記光学セル中において実質的に同一光路で伝搬させることを特徴とする。

【0012】更に、上記目的を達成するために、本願の請求項3記載の発明に係る光制御方法は、請求項1または2記載の光制御方法において、前記光学セル中の前記光応答性組成物を透過した後、発散していく信号光光線束のうち、前記強度変調および/または光束密度変調を強く受けた領域の信号光光線束を分別して取り出すことを特徴とする。

【0013】更に、上記目的を達成するために、本願の請求項4記載の発明に係る光制御方法は、請求項1または2記載の光制御方法において、前記光学セル中の前記光応答性組成物を透過した後、発散していく信号光光線束を、前記信号光光線束の発散角度よりも小さい角度範囲(開口角)で取り出すことによって、前記強度変調および/または光束密度変調を強く受けた領域の信号光光線束を分別して取り出すことを特徴とする。

【0014】更に、上記目的を達成するために、本願の請求項5記載の発明に係る光制御方法は、請求項1から4のいずれか記載の光制御方法において、前記制御光および前記信号光のそれぞれの焦点位置と前記光学セルとの位置関係を変化させることにより、前記制御光の照射によって、前記光学セルを透過した前記信号光の見かけの強度が減少する方向の光応答と、前記信号光の見かけの強度が増大する光応答との、どちらか一方を選択して取り出すことを特徴とする。

【0015】更に、上記目的を達成するために、本願の請求項6記載の発明に係る光制御方法は、請求項1から5のいずれか記載の光制御方法において、前記液状光応

答性組成物が色素を含有することを特徴とする。

【0016】更に、上記目的を達成するために、本願の請求項7記載の発明に係る光制御装置は、液状の光応答性組成物を充填した光学セルに、前記光応答性組成物が感応する波長の制御光を照射し、制御光とは異なる波長帯域にある信号光の透過率および/または屈折率を可逆的に増減させることにより前記光学セルを透過する前記信号光の強度変調および/または光束密度変調を行う光制御方法に用いられる光制御装置であって、前記制御光および前記信号光を各々収束させる収束手段を有し、収束された前記制御光および前記信号光のそれぞれの焦点近傍の光子密度が最も高い領域が互いに重なり合うように、前記制御光および前記信号光の光路をそれぞれ配置し、かつ、前記光学セル内の前記液状光応答性組成物は、収束された前記制御光および前記信号光のそれぞれの焦点近傍の光子密度が最も高い領域が互いに重なり合う位置に配置されていることを特徴とする。

【0017】更に、上記目的を達成するために、本願の請求項8記載の発明に係る光制御装置は、請求項7記載の光制御装置において、前記制御光および前記信号光が前記光学セル中において実質的に同一光路で伝搬するような光路配置を有することを特徴とする。

【0018】更に、上記目的を達成するために、本願の請求項9記載の発明に係る光制御装置は、請求項7または8記載の光制御装置において、前記光学セル中の前記光応答性組成物を透過した後、発散していく信号光光線束のうち、前記強度変調および/または光束密度変調を強く受けた領域の信号光光線束を分別して取り出す手段を有することを特徴とする。

【0019】更に、上記目的を達成するために、本願の請求項10記載の発明に係る光制御装置は、請求項9記載の光制御装置において、前記強度変調および/または光束密度変調を強く受けた領域の信号光光線束を分別して取り出す手段として、前記光学セルへ前記信号光を収束させて入射させる際に用いた収束手段の開口数よりも小さい開口数の収束手段を用いることを特徴とする。

【0020】更に、上記目的を達成するために、本願の請求項11記載の発明に係る光制御装置は、請求項9記載の光制御装置において、前記強度変調および/または光束密度変調を強く受けた領域の信号光光線束を分別して取り出す手段として、絞りを用いることを特徴とする。

【0021】更に、上記目的を達成するために、本願の請求項12記載の発明に係る光制御装置は、請求項7から11のいずれか記載の光制御装置において、前記制御光および前記信号光のそれぞれの焦点位置と前記光学セルとの位置関係を変化させる移動手段を有し、前記移動手段を用いることによって、前記制御光および前記信号光のそれぞれの焦点位置と前記光学セルとの位置関係を変化させることにより、前記制御光の照射によって前記

光学セルを透過した前記信号光の見かけの強度が減少する方向の光応答と、前記信号光の見かけの強度が増大する光応答との、どちらか一方を選択して取り出すことを特徴とす。

【0022】更に、上記目的を達成するために、本願の請求項13記載の発明に係る光制御装置は、請求項7から12のいずれか記載の光制御装置において、前記光学セル中の前記光応答性組成物を透過してきた信号光と制御光の混合光を、信号光と制御光とに分離する手段を有することを特徴とする。

【0023】更に、上記目的を達成するために、本願の請求項14記載の発明に係る光制御装置は、請求項7から13のいずれか記載の光制御装置において、前記制御光および前記信号光を各々収束させる前記収束手段、および／または、前記光学セル中の前記光応答性組成物を透過した後、発散していく信号光光線束のうち、前記強度変調および／または光束密度変調を強く受けた領域の信号光光線束を分別して取り出す手段、および／または、前記光学セル中の前記光応答性組成物を透過してきた信号光と制御光の混合光を、信号光と制御光とに分離する手段が、前記光学セルに組み込まれた構造を有することを特徴とする。

【0024】更に、上記目的を達成するために、本願の請求項15記載の発明に係る光制御装置は、請求項7から14のいずれか記載の光制御装置において、前記液状光応答性組成物が揮発性溶剤を含有することを特徴とする。

【0025】更に、上記目的を達成するために、本願の請求項16記載の発明に係る光制御装置は、請求項7から15のいずれか記載の光制御装置において、前記液状光応答性組成物が色素を含有することを特徴とする。

【0026】〔光応答性組成物、信号光の波長帯域、および制御光の波長帯域の組み合せ〕本発明の光制御方法で利用される光応答性組成物、信号光の波長帯域、および制御光の波長帯域は、これらの組み合わせとして、使用目的に応じて適切な組み合わせを選定し用いることができる。

【0027】具体的な設定手順としては、例えば、まず、使用目的に応じて信号光の波長ないし波長帯域を決定し、これを制御するのに最適な光応答性組成物と制御光の波長の組み合わせを選定すれば良い。または、使用目的に応じて信号光と制御光の波長の組み合わせを決定してから、この組み合わせに適した光応答性組成物を選定すれば良い。

【0028】本発明で用いられる液状の光応答性組成物の組成、および前記光応答性組成物を充填した光学セル中を伝播する信号光および制御光の光路長については、これらの組み合わせとして、光学セルを透過する制御光および信号光の透過率を基準にして設定することができる。例えば、まず、光応答性組成物の組成の内、少なく

とも制御光あるいは信号光を吸収する成分の濃度を決定し、次いで、光学セルを透過する制御光および信号光の透過率が特定の値になるよう光学セル中を伝播する信号光および制御光の光路長を設定することができる。または、まず、例えば装置設計上の必要に応じて、光路長を特定の値に設定した後、光学セルを透過する制御光および信号光の透過率が特定の値になるよう光応答性組成物の組成を調整することができる。

【0029】本発明は、できる限り低い光パワーで充分な大きさおよび速度の光応答を、液状の光応答性組成物を充填した光学セルから引出すような光制御方法および光制御装置を提供することを目的としているが、この目的を達成するために最適な、光学セルを透過する制御光および信号光の透過率の値は、それぞれ、次に示す通りである。

【0030】本発明の光制御方法および光制御装置では、光学セルを伝播する制御光の透過率が90%以下になるよう光応答性組成物中の光吸収成分の濃度および存在状態の制御、光路長の設定を行うことが好適である。

【0031】ここで、制御光の照射によって信号光の透過率が減少する方向の光応答を利用しようとする場合、制御光を照射しない状態において、光学セルを伝播する信号光の透過率が少なくとも10%以上になるよう光応答性組成物中の光吸収成分の濃度および存在状態の制御、光路長の設定を行うことが好適である。

【0032】〔光学セル〕本発明で用いられる光学セルは、液状の光応答性組成物を保持する機能、および液状の光応答性組成物に実効的に形態を付与する機能を有し、更に、収束されて照射される信号光および制御光を受光して前記光応答性組成物へ前記信号光および前記制御光を伝搬させる機能、および前記光応答性組成物を透過した後、発散していく前記信号光を伝搬させて出射する機能を有するものである。

【0033】本発明で用いられる光学セルの形態は外部形態と内部形態に大別される。

【0034】光学セルの外部形態は、本発明の光制御装置の構成に応じて、板状、直方体状、円柱状、半円柱状、四角柱状、三角柱状、などの形状のものが用いられる。

【0035】光学セルの内部形態とは、すなわち、液状の光応答性組成物を充填するための空洞の形態であり、液状の光応答性組成物に、実効的に形態を付与するものである。本発明の光制御装置の構成に応じて、光学セルの内部形態は、具体的には、例えば、薄膜、厚膜、板状、直方体状、円柱状、半円柱状、四角柱状、三角柱状、凸レンズ状、凹レンズ状、などの中から適宜選択することができる。

【0036】光学セルの構成および材質は、下記の要件を満たすものであれば任意のものを使用することができる。

【0037】(1) 上記のような外部形態および内部形態を、使用条件において精密に維持できること。

【0038】(2) 液状の光応答性組成物に対して不活性であること。

【0039】(3) 液状の光応答性組成物を構成する諸成分の放散・透過・浸透による組成変化を防止できること。

【0040】(4) 液状の光応答性組成物が、酸素や水など使用環境に存在する気体あるいは液体と接触することによって劣化することを妨げることができること。

【0041】なお、上記要件の内、液状の光応答性組成物の組成変化や劣化を防止する機能は、光学素子としての設計寿命の範囲内に限り発揮できれば良い。

【0042】前記制御光および前記信号光を収束させるための収束手段、および／または前記光学セル中の前記光応答性組成物を透過した後、発散していく信号光光線束のうち、前記強度変調および／または光束密度変調を強く受けた領域の信号光光線束を分別して取り出す手段、および／または前記光学セル中の前記光応答性組成物を透過してきた信号光と制御光の混合光を信号光と制御光とに分離する手段を、前記光学セルに組み込んだ一体構造の光学セルを用いることができる。

【0043】[光応答性組成物] 本発明において、制御光を照射したとき、制御光とは異なる波長帯域にある信号光の透過率および／または屈折率を可逆的に変化させるような光学制御方法および光制御装置に用いられる液状の光応答性組成物としては、公知の種々のものを使用することができる。

【0044】その例を具体的に挙げるならば、例えば、 $\text{GaAs}$ 、 $\text{GaAsP}$ 、 $\text{GaAlAs}$ 、 $\text{InP}$ 、 $\text{InSb}$ 、 $\text{InAs}$ 、 $\text{PbTe}$ 、 $\text{InGaAsP}$ 、 $\text{ZnSe}$ などの化合物半導体の超微粒子を液状のマトリックス材料中へコロイド分散したもの、異種金属イオンをドープした金属ハロゲン化物（例えば臭化カリウム、塩化ナトリウムなど）または前記金属ハロゲン化物（例えば臭化銅、塩化銅、塩化コバルトなど）の超微粒子を液状のマトリックス材料中へコロイド分散したもの、銅などの異種金属イオンをドープした $\text{CdS}$ 、 $\text{CdSe}$ 、 $\text{CdS}$ 、 $\text{CdSe}$ などのカドミウムカルコゲナイトの超微粒子を液状のマトリックス材料中へコロイド分散したもの、シリコン、ゲルマニウム、セレン、テルルなどの半導体の超微粒子を液状のマトリックス材料中へコロイド分散したもの、白金、金、パラジウムなどの貴金属の超微粒子を液状のマトリックス材料中へコロイド分散したもの、金属イオン（例えばネオジウムイオン、エルビウムイオンなど）の錯体を液状のマトリックス材料中へ溶解ないしコロイド分散したもの、などのほか、マトリックス材料中に色素を溶解またはコロイド分散したものを使い適に使用することができる。

【0045】これらの中でも、マトリックス材料中に色

素を溶解またはコロイド分散したものは、マトリックス材料および色素の選択範囲が広く、かつ光学セルへの加工も容易であるため、本発明で特に好適に用いることができる。

【0046】[色素] 本発明では、色素として、公知のものを使用することができる。

【0047】本発明で用いることのできる色素の具体例としては、例えば、ローダミンB、ローダミン6G、エオシン、フロキシンBなどのキサンテン系色素、アクリジンオレンジ、アクリジンレッドなどのアクリジン系色素、エチルレッド、メチルレッドなどのアゾ色素、ポルフィリン系色素、フタロシアニン系色素、3、3'－ジエチルチアカルボシアニンヨージド、3、3'－ジエチルオキサジカルボシアニンヨージドなどのシアニン色素、ブリリアントグリーン、ビクトリアブルーRなどのトリアリールメタン系色素、などを好適に使用することができる。

【0048】本発明では、これらの色素を単独で、または、2種類以上を混合して使用することができる。

【0049】[マトリックス材料] 本発明で用いることのできるマトリックス材料は、(1) 液状であること、

(2) 本発明の光制御方式で用いられる光の波長領域で透過率が高いこと、(3) 本発明で用いられる色素などを安定性良く溶解またはコロイド分散できること、

(4) 光応答性組成物としての組成を安定性良く保つことができる、という条件を満足するものであれば任意のものを使用することができる。

【0050】無機系のマトリックス材料としては、例えば、水、水ガラス（アルカリケイ酸塩の濃厚水溶液）、塩酸、硫酸、硝酸、王水、クロルスルホン酸、メタヌルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、などを使用することができる。

【0051】また、有機系のマトリックス材料としては、各種有機溶剤、および、液状の有機高分子材料を使用することができる。

【0052】揮発性の有機溶剤としては、具体的には、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、 $n$ -ブタノール、アミルアルコール、シクロヘキサン、ベンジルアルコールなどのアルコール類、エチレングリコール、ジエチレングリコール、グリセリンなどの多価アルコール類、酢酸エチル、酢酸 $n$ -ブチル、酢酸アミル、酢酸イソプロピルなどのエステル類、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサンなどのケトン類、ジエチルエーテル、ジブチルエーテル、メトキシエタノール、エトキシエタノール、ブトキシエタノール、カルピトールなどのエーテル類、テトラヒドロフラン、1、4-ジオキサン、1、3-ジオキソラン、などの環状エーテル類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、1、2-ジクロロエタン、1、1、2-トリクロロエタン、トリクレン、ブ

ロモホルム、ジブロモメタン、ジヨードメタン、などのハロゲン化炭化水素類、ベンゼン、トルエン、キシリソ、クロロベンゼン、o-ジクロロベンゼン、ニトロベンゼン、アニソール、 $\alpha$ -クロロナフタレンなどの芳香族炭化水素類、n-ペントン、n-ヘキサン、n-ヘプタン、シクロヘキサンなどの脂肪族炭化水素類、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、ヘキサメチルホスホリックトリアミドなどのアミド類、N-メチルピロリドンなどの環状アミド類、テトラメチル尿素、1、3-ジメチル-2-イミダゾリジノンなどの尿素誘導体類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類、炭酸エチレン、炭酸プロピレンなどの炭酸エステル類、アセトニトリル、プロピオニトリル、ベンゾニトリルなどのニトリル類、ピリジン、キノリンなどの含窒素複素環化合物類、トリエチルアミン、トリエタノールアミン、ジエチルアミノアルコール、アニリンなどのアミン類、クロル酢酸、トリクロル酢酸、トリフルオロ酢酸、酢酸などの有機酸の他、ニトロメタン、二硫化炭素、スルホランなどの溶剤を用いることができる。

【0053】これらの溶剤は、また、複数の種類のものを混合して用いても良い。

【0054】【マトリックス材料中への色素の溶解またはコロイド分散】これらのマトリックス材料中へ色素を溶解またはコロイド分散させるには公知の方法を用いることができる。例えば、色素を有機溶剤や水ガラスに溶解する方法、色素と不揮発性で液状のマトリックス材料を共通の揮発性溶媒中へ溶解して混合した後、溶媒を蒸発させて除去する方法、液状の有機高分子系マトリックス材料の原料モノマー中へ、必要に応じて溶媒を用いて、色素を溶解または分散させてから該モノマーを重合しないし重縮合させてマトリックス材料を形成する方法、などを好適に用いることができる。色素とマトリックス材料の組合せおよび加工方法を工夫することで、色素分子を凝集させ、「H会合体」や「J会合体」などと呼ばれる特殊な会合体を形成させることができることが知られているが、マトリックス材料中の色素分子をこのような凝集状態もしくは会合状態を形成する条件で使用しても良い。

【0055】また、液状のマトリックス材料中へ前記の種々の超微粒子をコロイド分散させるには公知の方法を用いることができる。例えば、前記超微粒子を液状のマトリックス材料中で形成させる方法、化学的気相成長法、スパッタリング法、不活性ガス中蒸発法などの気相法で製造した超微粒子を、必要に応じて分散剤を用いて、液状のマトリックス材料中へ捕集する方法、などを好適に用いることができる。

【0056】なお、本発明で用いられる液状の光応答性組成物は、その機能に支障をきたさない範囲において、光学素子としての安定性・耐久性を向上させるため、副成分として公知の酸化防止剤、紫外線吸収剤、一重項酸

素クエンチャー、分散助剤、分散安定剤、界面活性剤などを含有しても良い。

#### 【0057】

【発明の実施の形態】以下、図面に基づき本発明の実施形態について説明する。

【0058】【実施形態1】図1には本実施形態の光制御装置の概略構成が示されている。このような光学装置構成および配置は、図1に例示するように、内部形態が薄膜型の光学セル8を用いる場合の他、内部および外部形態が板状、直方体状、円柱状、半円柱状、四角柱状などの光学セルを用いる場合にも好適に用いることができる。

【0059】ここで、内部形態が薄膜型の光学セル8は例えば以下のよう構成のものである。

【0060】(1) 光学ガラスまたは石英ガラス製セル800(図2)。

【0061】(2) 2枚の板ガラスをスペーサーおよびゴムパッキンを挟んで重ね合わせ、固定用の金属枠で保持した構成の組立式光学セル810(図3)。

【0062】図2に示すような光学ガラスまたは石英ガラス製セル800は入射・出射面ガラス801および802、側面ガラス803および804、および、底面ガラス805によって、液状光応答性組成物充填部808を形成したものである。ガラス材質としては石英ガラスのほか、ソーダガラス、ホウケイ酸ガラスなどの光学ガラスを使用することができ、公知のガラス加工技術によって製造することができる。光学セルとしての精度を獲得するためには、ガラス加工時に、入射・出射面ガラス801および802の平面性および平行度を高度に維持する必要がある。液状の光応答性組成物は導入口807から導入管806を通じて充填される。導入口807に例えばポリ四フッ化エチレン製栓(図示せず)を挿入すること、あるいは、導入口807をガラス加工で封じることによって、充填した液状光応答性組成物を光学セル中に封印し、前記の光学セルの要件を満たすことができる。光学ガラスまたは石英ガラス製セル800は、ガラスを腐食する溶液、例えば強アルカリ性の液体、フッ化水素酸、またはホウフッ化水素酸などを用いる場合を除き、大多数の有機および無機マトリックス材料を用いた液状光応答性組成物を充填する際に、広く使用することができる。特に、マトリックス材料として、塩酸、硫酸、硝酸、王水、クロルスルホン酸、メタンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、クロル酢酸、トリクロル酢酸、トリフルオロ酢酸、酢酸などの酸を用いる場合に有用である。

【0063】図2に示すガラス製光学セル800と同じような形態を、ポリメタクリル酸メチル、ポリスチレン、ポリカーボネイトなどの透明プラスチック(有機ガラス)で製造し、光学セルとして使用することもできる。ただし、この場合は、マトリックス材料が該プラスチックに吸着する場合がある。

チックを溶解したり侵したりしないよう、材料選択・組み合わせに留意する必要がある。

【0064】図3に示すような組立式光学セル810は、液状光応答性組成物充填部818を設けたスペーサー814を2枚の板状の入射・出射面ガラス813および815で挟み、これをゴムパッキン812および816を介して固定枠811および817で挟み、固定ネジ穴824および825にネジ(図示せず)を用いて固定するものである。固定枠817に取り付けた導入管822および823は、固定枠817に設けた導入孔821、ゴムパッキン816に設けた導入孔820、次いで入射・出射面ガラス815に設けた導入孔819に通じており、これらの導入経路を通して液状の光応答性組成物を充填部818へ導入することができる。充填部818の厚さ、すなわち、信号光および/または制御光が垂直に入射したとき光応答性組成物中を伝播する光路長は、組立時のスペーサー814の厚さによって決定される。スペーサー814、入射・出射面ガラス813および815、ゴムパッキン812および815、および、固定枠811および817は、すべて液状の光応答性組成物に接触するので、液状のマトリックス材料の溶解性、浸透性、透過性、および/または腐食性に耐える材質である必要がある。具体的には、スペーサー814の材質は光学ガラス、石英ガラス、ポリ四フッ化エチレン、ブチルゴム、シリコンゴム、エチレン・プロピレンゴムなどが好ましい。特に、前記光路長の精度維持と液のシール性維持を両立させるためには、ポリ四フッ化エチレンなどのフッ素系高分子材料が好適に用いられる。

【0065】入射・出射面ガラス813および815としては、石英ガラスのほか、合成サファイヤ、ソーダガラス、ホウケイ酸ガラスなどの光学ガラスを使用することができる。また、前記マトリックス材料が無機ガラスを腐食する液体の場合、ポリメタクリル酸メチル、ポリスチレン、ポリカーボネイトなどの有機ガラスを用いることもできる。ゴムパッキン812および816の材質としては、ブチルゴム、シリコンゴム、エチレン・プロピレンゴム、放射線照射架橋したフッ素樹脂系ゴムなどを用いることができる。固定枠811および817はステンレス、金メッキした真鍮などの金属製のものを好適に用いることができる。

【0066】以下、図1の光学セル8として、液状光応答性組成物の膜厚(垂直入射した場合の光路長)が50μmになるように調製された図2の石英ガラス製セル800にテトラ(t-ブチル)銅フタロシアニンのクロロホルム溶液(濃度 $5 \times 10^{-3}$ モル/リットル)を充填したものを用いた場合について説明する。この場合の光学セル8の透過率スペクトルを図4に示す。この光学セル8の透過率は制御光の波長(633nm)で0.5%、信号光の波長(830nm)で91%であった。

【0067】図1に概要を例示する本発明の光制御装置

は、制御光の光源1、信号光の光源2、NDフィルター3、シャッター4、半透過鏡5、光混合器6、集光レンズ7、光学セル8、受光レンズ9、波長選択透過フィルター20、絞り19、光検出器11および22、およびオシロスコープ100から構成される。

【0068】これらの光学素子ないし光学部品のうち、制御光の光源1、信号光の光源2、光混合器6、集光レンズ7、光学セル8、受光レンズ9、および、波長選択透過フィルター20は、図1の装置構成で本発明の光制御方法を実施するために必須の装置構成要素である。なお、NDフィルター3、シャッター4、半透過鏡5、および絞り19は必要に応じて設けるものであり、また、光検出器11および22、およびオシロスコープ100は、本発明の光制御方法を実施するためには必要ないが光制御の動作を確認するための電子装置として、必要に応じて用いられる。

【0069】次に、個々の構成要素の特徴ならびに動作について説明する。

【0070】制御光の光源1にはレーザー装置が好適に用いられる。その発振波長および出力は、本発明の光制御方法が対象とする信号光の波長および使用する光応答性組成物の応答特性に応じて適宜選択される。レーザー発振の方式については特に制限はなく、発振波長帯域、出力、および経済性などに応じて任意の形式のものを用いることができる。また、レーザー光源の光を非線形光学素子によって波長変換してから使用しても良い。具体的には例えば、アルゴンイオンレーザー(発振波長457.9ないし514.5nm)、ヘリウム・ネオンレーザー(633nm)などの気体レーザー、ルビーレーザーやNd:YAGレーザーなどの固体レーザー、色素レーザー、半導体レーザーなどを好適に使用することができる。信号光の光源2にはレーザー光源からのコヒーレント光だけではなく非コヒーレント光を使用することもできる。また、レーザー装置、発光ダイオード、ネオン放電管など、単色光を与える光源の他、タンゲステン電球、メタルハライドランプ、キセノン放電管などからの連続スペクトル光を光フィルターやモノクロメーターで波長選択して用いても良い。

【0071】本発明の光制御方法で利用される光応答性組成物、信号光の波長帯域、および制御光の波長帯域は、これらの組み合わせとして、使用目的に応じて適切な組み合わせが選定され、用いられる。以下、信号光の光源2として半導体レーザー(発振波長830nm、連続発振出力5mW、ビーム整形後の直径約8mmのガウスビーム)、制御光の光源1としてヘリウム・ネオンレーザー(発振波長633nm、ビーム直径2mmのガウスビーム)、および光学セル8として前記の液状光応答性組成物を充填した光学セル800の組み合わせを用いた場合について実施形態を説明する。

【0072】NDフィルター3は必ずしも必要ではない

が、装置を構成する光学部品や光学素子へ必要以上に高いパワーのレーザー光が入射することを避けるため、また、本発明で用いられる光学素子の光応答性能を試験するにあたり、制御光の光強度を増減するために有用である。この実施形態では後者の目的で数種類のNDフィルターを交換して使用した。

【0073】シャッター4は、制御光として連続発振レーザーを用いた場合に、これをパルス状に明滅させるために用いられるものであり、本発明の光制御方法を実施する上で必須の装置構成要素ではない。すなわち、制御光の光源1がパルス発振するレーザーであり、そのパルス幅および発振間隔を制御できる形式の光源である場合や、適当な手段で予めパルス変調されたレーザー光を光源1として用いる場合は、シャッター4を設けなくても良い。

【0074】シャッター4を使用する場合、その形式としては任意のものを使用することができ、例えば、オティカルチョッパ、メカニカルシャッター、液晶シャッター、光効果シャッター、ポッケルセル、音響光学(AO)変調器などを、シャッター自体の作動速度を勘案して適時選択して使用することができる。

【0075】半透過鏡5は、この実施形態において、本発明の光制御方法の作用を試験するにあたり、制御光の光強度を常時見積もるために用いるものであり、光分割比は任意に設定可能である。

【0076】光検出器11および22は、本発明の光・光制御による光強度の変化の様子を電気的に検出して検証するため、また、本発明の光制御装置の性能を試験するために用いられる。光検出器11および22の形式は任意であり、検出器自体の応答速度を勘案して適時選択して使用することができ、例えば、光電子増倍管やフォトダイオード、フォトトランジスターなどを使用することができる。

【0077】前記光検出器11および22の受光信号はオシロスコープ100などの他、AD変換器とコンピューターの組合せ(図示せず)によってモニターすることができる。

【0078】光混合器6は、光学セル8中を伝播して行く制御光および信号光の光路を調節するために用いるものであり、本発明の光制御方法および光制御装置を実施するに当たり重要な装置構成要素の一つである。偏光ビームスプリッター、非偏光ビームスプリッター、またはダイクロイックミラーのいずれも使用することができ、光分割比についても任意に設定可能である。

【0079】集光レンズ7は、信号光および制御光に共通の収束手段として、光路が同一になるように調節された信号光および制御光を収束させて前記光学セル8へ照射するためのものであり、本発明の光制御方法および光制御装置の実施に必須な装置構成要素の一つである。集光レンズ7の焦点距離、開口数、F値、レンズ構成、レ

ンズ表面コートなどの仕様については任意のものを適宜使用することができる。集光レンズ7を前記光学セルに組み込むこともできる。

【0080】この実施形態では集光レンズ7として、倍率40倍、焦点距離5mm、開口数0.65の顕微鏡用対物レンズを用いた。

【0081】受光レンズ9は、収束されて光学セル8へ照射され、透過してきた信号光および制御光を平行および/または収束ビームに戻すための手段であるが、本実施形態に示すように、前記集光レンズ7の開口数より小さい開口数のレンズを用いることによって、充分な大きさで強度変調および/または光束密度変調された信号光を再現性良く分別して取り出すことができる。

【0082】本実施形態では受光レンズ9として、例えば、倍率20倍、開口数0.4の顕微鏡レンズを用いた。すなわち、集光レンズ7の開口数より受光レンズ9の開口数を小さくすることにより、信号光の光束のうち、強度変調および/または光束密度変調を強く受けた領域の光束を分別して取り出すことが可能となり、充分な大きさで変調を受けた信号光を再現性良く検出できるようになる。もちろん、レンズ開口数が大きくても、絞り19を入れたり、光検出器22に光束の中心部分のみ入射させて実質的に開口数を小さくしても良いことは言うまでもない。また、後で述べるように、集光レンズおよび受光レンズの代りに凹面鏡を用いることも可能である(実施形態4参照)。更に、受光レンズ9を前記光学セル8に組み込むこともできる。

【0083】波長選択透過フィルター20は、図1の装置構成で本発明の光制御方法を実施するために必須の装置構成要素の一つであり、前記光学セル8中の同一の光路を伝播してきた信号光と制御光の混合光から信号光のみを取り出すための手段の一つとして用いられる。

【0084】波長の異なる信号光と制御光とを分離するための手段としては他に、プリズム、回折格子、ダイクロイックミラーなどを使用することができる。これらの、信号光・制御光分離手段を前記光学セル8に組み込むことができる。

【0085】図1の装置構成で用いられる波長選択透過フィルター20としては、制御光の波長帯域の光を完全に遮断し、一方、信号光の波長帯域の光を効率良く透過することができるような波長選択透過フィルターであれば、公知の任意のものを使用することができる。例えば、色素で着色したプラスチックやガラス、表面に誘電体多層蒸着膜を設けたガラスなどを用いることができる。

【0086】以上のような構成要素から成る図1の光学装置において、光源1から出射された制御光の光ビームは、透過率を加減することによって透過光強度を調節するためのNDフィルター3を通過し、次いで制御光をパルス状に明滅するためのシャッター4を通過して、半透

過鏡5によって分割される。

【0087】半透過鏡5によって分割された制御光の一部は光検出器11によって受光される。ここで、光源2を消灯、光源1を点灯し、シャッター4を開放した状態において、光学セル8への光ビーム照射位置における光強度と光検出器11の信号強度との関係をあらかじめ測定して検量線を作成しておけば、光検出器11の信号強度から、光学セル8に入射する制御光の光強度を常時推定することができる。この実施形態では、NDフィルター3によって、光学セル8へ入射する制御光のパワーを0.5mWないし25mWの範囲で調節した。

【0088】半透過鏡5で分割・反射された制御光は、光混合器6および集光レンズ7を通って、収束されて光学セル8に照射される。光学セル8を通過した制御光の光ビームは、受光レンズ9を通過した後、波長選択透過フィルター20によって遮断される。

【0089】光源2から出射された信号光の光ビームは、前記光混合器6によって、制御光と同一光路を伝播するよう混合され、集光レンズ7を経由して、光学セル8に収束・照射され、素子を通過した光は受光レンズ9および波長選択透過フィルター20を透過した後、必要に応じて設けられる絞り19を通過した後、光検出器22にて受光される。

【0090】図1の光学装置を用いて光制御の実験を行い、図5および図6に示すような光強度変化を観測した。図5および図6において、111は光検出器11の受光信号、222および223は光検出器22の受光信号である。光検出器22の受光信号222の得られる場合と223の得られる場合の違いは、以下の通りである。

【0091】図1の装置配置においては、光学セル8に制御光と信号光とを収束して入射させているが、収束ビーム径が最小となる位置（焦点Fc）を光学セル8の集光レンズ7に近い所（光の入射側）に設定すると、前記光学セル8を透過した前記信号光の見かけの強度が減少する方向の光応答222が観察される。一方、収束ビーム径が最小となる位置（焦点Fc）を光学セル8の受光レンズ9に近い所（光の出射側）に設定すると、前記光学セル8を透過した前記信号光の見かけの強度が増大する方向の光応答223が観察される。

【0092】このような光応答が生じる機構の詳細については未解明であり、現在、鋭意検討中であるが、制御光の照射により光応答性組成物の透過率や屈折率等が変化することに起因するものと推測される。

【0093】ここで、同一の光路で収束された制御光と信号光の焦点位置と光学セルの位置関係を変化させる方法としては、例えば精密ねじによる微動機構を設けた架台、圧電素子アクチュエータを設けた架台、または超音波アクチュエータを設けた架台などの上に光学セル8を取り付けて上記のように移動させる他、集光レンズ7の

材質に非線形屈折率効果の大きいものを用いて制御光パルスのパワー密度を変えて焦点位置を変化させる方法、集光レンズ7の材質に熱膨張係数の大きいものを用いて加熱装置で温度を変えて焦点位置を変化させる方法などを用いることができる。

【0094】図1の光学装置を用いて光制御の実験を行い、図5および図6に示すような光強度変化を観測したが、その詳細は以下に述べる通りである。

【0095】まず、制御光の光ビームと信号光の光ビームとが、光学セル8内部または近傍の同一領域で焦点Fcを結ぶように、それぞれの光源からの光路、光混合器6、および集光レンズ7を調節した。次いで、波長選択透過フィルター20の機能を点検した。すなわち、光源2を消灯した状態で、光源1を点灯し、シャッター4を開閉した場合には光検出器22に応答が全く生じないことを確認した。

【0096】なお、収束ビーム径最小位置（焦点Fc）の光学セル8上での移動は、光学セル8を移動させて行った。すなわち、集光レンズ7および受光レンズ9の間隔（d78+d89）を固定したまま、光学セル8と集光レンズ7の距離を変化させ、同一の光路で収束された制御光および信号光の焦点位置と光学セル8との位置関係を変化させて行った。

【0097】まず前記焦点Fcを光学セル8の集光レンズ7に置した場合について述べる。この場合の、制御光の波形111に対する信号光の応答波形222を図5に示す。

【0098】シャッター4を閉じた状態で制御光の光源1を点灯し、次いで、時刻t1において光源2を点灯し光学セル8へ信号光を照射すると、光検出器22の信号強度はレベルCからレベルAへ増加した。

【0099】時刻t2においてシャッター4を開放し、光学セル8内部の信号光が伝播しているのと同一の光路へ制御光を収束・照射すると光検出器22の信号強度はレベルAからレベルBへ減少した。すなわち、信号光の見かけの強度が減少する方向の光応答が観察された。この変化の応答時間は2マイクロ秒未満であった。

【0100】時刻t3においてシャッター4を閉じ、光学セルへの制御光照射を止めると光検出器22の信号強度はレベルBからレベルAへ復帰した。この変化の応答時間は3マイクロ秒未満であった。

【0101】時刻t4においてシャッター4を開放し、ついで、時刻t5において閉じると、光検出器22の信号強度はレベルAからレベルBへ減少し、次いでレベルAへ復帰した。

【0102】時刻t6において光源2を消灯すると光検出器22の出力は低下し、レベルCへ戻った。

【0103】ついで、前記焦点Fcを光学セル8の受光レンズ9側に設置した場合について述べる。この場合の、制御光の波形111に対する信号光の応答波形22

3を図6に示す。

【0104】シャッター4を閉じた状態で制御光の光源1を点灯し、次いで、時刻t<sub>1</sub>において光源2を点灯し光学セル8へ信号光を照射すると、光検出器22の信号強度はレベルCからレベルAへ増加した。

【0105】時刻t<sub>2</sub>においてシャッター4を開放し、光学セル8内部の信号光が伝播しているのと同一の光路へ制御光を収束・照射すると光検出器22の信号強度はレベルAからレベルDへ増加した。すなわち、信号光の見かけの強度が増大する方向の光応答が観察された。この変化の応答時間は2マイクロ秒未満であった。

【0106】時刻t<sub>3</sub>においてシャッター4を閉じ、光学セルへの制御光照射を止める、と光検出器22の信号強度はレベルDからレベルAへ復帰した。この変化の応答時間は3マイクロ秒未満であった。

【0107】時刻t<sub>4</sub>においてシャッター4を開放し、ついで、時刻t<sub>5</sub>において閉じると、光検出器22の信号強度はレベルAからレベルDへ増加し、次いでレベルAへ復帰した。

【0108】時刻t<sub>6</sub>において光源2を消灯すると光検出器22の出力は低下し、レベルCへ戻った。

【0109】以上まとめると、光学セル8へ、制御光を図5または図6の111に示すような波形で表される光強度の時間変化を与えて照射したところ、信号光の光強度をモニターして示す光検出器22の出力波形は図5の222または図6の223に示すように、制御光の光強度の時間変化に対応して可逆的に変化した。すなわち、制御光の光強度の増減または断続により信号光の透過を制御すること、すなわち光で光を制御すること(光・光制御)、または、光で光を変調すること(光・光変調)ができることが確認された。

【0110】なお、制御の光の断続に対応する信号光の光強度の変化の程度は、前記の光検出器22の出力レベルA、BおよびCを用いて次に定義される値 $\Delta T$  [単位%] または、A、CおよびDを用いて次に定義される値 $\Delta T'$  [単位%]

【数1】

$$\Delta T = 100 \left[ (A - B) / (A - C) \right]$$

【数2】

$$\Delta T' = 100 \left[ (D - A) / (A - C) \right]$$

によって定量的に比較することができる。ここで、Aは制御光を遮断した状態で信号光の光源2を点灯した場合の光検出器22の出力レベル、BおよびDは信号光と制御光を同時に照射した場合の光検出器22の出力レベル、Cは信号光の光源2を消灯した状態の光検出器22の出力レベルである。

【0111】上の例において、制御光の入射パワーを5mWとし、集光レンズ7および受光レンズ9に対する光学セル8の位置を変化させて信号光の光応答の向きと大きさを調べたところ、信号光強度が減少する向きの応答

の大きさ $\Delta T$ の最大値は89%、見かけの信号光強度が増加する向きの応答の大きさ $\Delta T'$ の最大値は51%であった。なお、制御光の焦点位置を光学セル内の光応答性組成物の入射側近傍に置き、制御光を1ミリ秒よりも長いパルス幅で照射した場合、制御光のパワーを10mWよりも大きくすると、制御光の焦点位置において、溶剤のクロロホルムが沸騰を始めた。溶剤の沸騰は極めて局部的に起こるため、光学セル内部の圧力上昇は極めて軽微であった。また、制御光を遮断すると、直ちに沸騰は停止した。

【0112】上記のように収束ビーム径が最小となる位置(焦点Fc)と光学セル8の位置関係を変えることによって、信号光の光応答の向きを逆転させ、信号光の見かけの強度が減少する方向、または、増加する方向の応答を得ることができる。

【0113】このような光応答変化の生じる機構を調べるため、光制御を行った場合に起こる信号光ビーム断面における光強度分布の変化の測定を行った。すなわち、図1の装置において、受光レンズ9を集光レンズ7の開口数(本実施形態の場合は0.65)よりも大きな開口数(例えば0.75)のものに変更し、絞り19を取り外し、光検出器22の代わりに図7に概要を示すような光強度分布測定器を設置し、光学セル8を透過した光線束の全てを受光レンズ9で受光・収束させて前記光強度分布測定器の受光部31(有効直径4mm)へ入射させ、信号光光線束断面の光強度分布を測定した。測定結果を図8、9、10に示す。ここで、光強度分布測定器は、図7に示すように、受光部31(有効直径4mm)に対して幅1mmの第一のスリット32を設け、第一のスリットの長さ方向、すなわち図7において点Xから点Yの向きに、幅25μmの第二のスリット33を一定速度で移動させて、2枚のスリットが作る1mm×25μmの長方形の窓を通過した光の強度を、前記窓の移動位置に対応させて測定する装置である。前記窓の移動位置に対応させて光強度を測定するには、例えば、第二のスリット33の移動速度に同期させたストレージオシロスコープ上に、前記窓を通過した光を受光した検出器の出力を記録すれば良い。図8～10は、以上のようにして、ストレージオシロスコープ上に記録された信号光の光ビーム断面についての光強度分布を示すものであり、横軸(光ビーム断面内の位置)は図7の点Xから点Yの方向の位置に対応し、縦軸は光強度を表す。

【0114】図8は、光学セル8に制御光が入射せず、信号光のみが入射した場合の前記信号光ビーム断面の光強度分布である。この場合の光強度分布は、中心部分の強度が強く、周辺に行くに従い強度が弱まる分布(おおむね「ガウス分布」)である。

【0115】図9は、収束ビーム径が最小となる位置(焦点Fc)を光学セル8の集光レンズ7に近い所(光の入射側)に設定し、制御光を照射したとき見かけの信

号光強度が減少する向きの光応答222が観察される条件において、制御光を照射したときの信号光ビーム断面の光強度分布である。この場合の光強度分布は、中心部分の光強度が弱く、周辺で光強度が増大する分布になっている。信号光ビーム断面の中心部の光強度は、制御光強度および光学セル8と焦点の位置関係に依存して減少し、制御光強度が増すにつれてゼロに近づいていく。したがって、この場合、信号光ビームの中心部分だけを取り出して、見かけの信号光強度を測定すると、制御光の断続に対応して、信号光の強度が減少する向きの光応答222を、充分な大きさで取り出すことができる。

【0116】図10は、収束ビーム径が最小となる位置(焦点Fc)を光学セル8の受光レンズ9に近い所(光の出射側)に設定し、制御光を照射したとき見かけの信号光強度が増大する向きの光応答223が観察される条件において、制御光を照射したときの信号光ビーム断面の光強度分布である。この場合は、中心部分の光強度が、制御光を照射しない場合の中心部分の光強度(図8)より強くなっている。この場合、信号光ビーム断面の中心部の光強度は、制御光強度および光学セル8を焦点位置の関係に依存するが、制御光非照射時の数倍にも達する。したがって、この場合、信号光ビームの中心部分だけを取り出して、見かけの信号光強度を測定すると、制御光の断続に対応して、信号光の強度が増大する向きの光応答223を充分な大きさで取り出すことができる。

【0117】以上の実験から、制御光の断続による信号光の光強度変調(光応答)は、信号光ビーム(光束)断面の中心部で、特に大きく起きていることが判る。したがって、本発明の主旨とは逆に、受光レンズ9の開口数を集光レンズ7の開口数よりも大きくして、光学セル8を透過した信号光を全て補足し、光検出器で受光した場合、検出される光応答は、本発明の場合に比べて著しく小さくなってしまう。また、光検出器に、制御光による光変調を受けた部分以外のノイズ成分が取り込まれてしまい、S/N比が著しく悪くなってしまう。

【0118】【実施形態2】本発明の光制御光法および光制御装置において光応答を大きくするためには前記制御光および前記信号光を各々収束させて前記光学セルへ照射し、かつ、前記制御光および前記信号光のそれぞれの焦点の近傍の光子密度が最も高い領域が前記光学セル中において互いに重なり合うように前記制御光および前記信号光の光路をそれぞれ配置すれば良いが、そのためには信号光および制御光を実質的に同一光路で伝播させることが好ましい。なお、前記制御光および前記信号光の電場の振幅分布がガウス分布となっているガウスピームの場合、集光レンズ7などで、開き角2θで収束させたときの焦点Fc近傍における光線束および波面30の様子を図11に示す。ここで、波長λのガウスピームの直径2w0が最小になる位置、すなわちビームウエスト

の半径w0は次の式で表される。

【0119】

$$[\text{数3}] w_0 = \lambda / (\pi \cdot \theta)$$

例えば、実施形態1で用いた集光レンズ(焦点距離5mm、開口数0.65)で波長633nm、ビーム直径1mmの制御光を収束したときのビームウエストの半径w0は2.02μm、同様にして波長830nm、ビーム直径8mmの信号光を収束したときのビームウエストの半径w0は0.392μm(ほぼ回折限界)と計算される。

【0120】図12に示すように、信号光および制御光が「実質的に同一光路」と看做すことができるのは次のような場合である:

- 1) 制御光と信号光の光軸が互いに平行であって、制御光の光路、例えば断面L02(半径r2)の中に信号光の光路、例えば断面L+1、L01、またはL-1(半径r1: r1 ≤ r2)が重なって伝搬する場合、
- 2) 制御光と信号光の光軸が互いに平行であって、信号光の光路、例えば断面L02(半径r2)の中に制御光の光路、例えば断面L+1、L01、またはL-1(半径r1: r1 ≤ r2)が重なって伝搬する場合、
- 3) 制御光と信号光の光軸が互いに平行(光軸間の距離l+1、l-1、またはl+1+l-1)であって、制御光の光路が断面L+1、L01、またはL-1のいずれか、信号光の光路も断面L+1、L01、またはL-1のいずれかである場合。

【0121】表1のデータは、一例として、実施形態1の装置において、集光レンズ7として、開口数0.65の顕微鏡用対物レンズを用い、受光レンズ9として、開口数0.4の顕微鏡用レンズを用い、収束ビーム径が最小となる位置(焦点)を光学セル8の集光レンズ7に近い所(光の入射側)に設定し、前記光学セルを透過した前記信号光が減少する方向の光応答222が観察される条件下、信号光の光路を断面L02(直径8mm)に固定し、断面L+1、L01、またはL-1(直径1mm)の制御光の光路(光軸)を光軸間の距離l+1またはl-1として±1.2mm平行移動した場合の、信号光・光応答の大きさΔTの変化を示したものである。信号光および制御光の光軸が完全に一致している場合の光応答が最大であるが、光軸間の距離l+1またはl-1が±0.6mm程度ずれても、光応答の大きさΔTは7ポイントほど変化するにすぎない。

【0122】すなわち、収束された信号光および制御光のそれぞれの焦点の近傍の光子密度が最も高い領域(ビームウエスト)が前記光学セル内の光応答性組成物中ににおいて互いに重なり合うように前記制御光および前記信号光の光路がそれぞれ配置され、これらの領域の重なり合いが最大になったとき、すなわち、前記制御光および前記信号光の光軸が完全に一致したとき前記光応答は最大になること、前記制御光および前記信号光の光路が実

質的に同一のとき、充分大きな光応答が得られることが判った。

## 【0123】

【表1】

| 制御光 (633 nm) の<br>平行移動距離 $l/\mu\text{m}$ | 信号光 (830 nm) の<br>光応答 $\Delta T/\%$ |
|--|-------------------------------------|
| -1.2                                     | 32                                  |
| -0.9                                     | 66                                  |
| -0.6                                     | 82                                  |
| -0.3                                     | 87                                  |
| 0.0                                      | 89                                  |
| +0.3                                     | 86                                  |
| +0.6                                     | 83                                  |
| +0.9                                     | 65                                  |
| +1.2                                     | 34                                  |

【比較例1】従来の技術に基づく比較実験を行うため、特開昭53-137884号公報、特開昭63-231424号公報、および特開昭64-73326号公報の記述に従い、図13に概要を示すような構成の装置を用い、光制御を試みた。すなわち、光路長1 cmの石英製溶液セル27に絞り19を通した信号光の光源2からの半導体レーザー光（波長830 nm）を照射し、透過した光を波長選択透過フィルター20を経由して光検出器22で受光し、一方、溶液セル27を透過する信号光の光路全体に、信号光に直交する方向から制御光を、投射レンズ26を用いて拡散させて照射した。図13の装置構成において、信号光の光源1（波長633 nm）、NDフィルター3、シャッター4、半透過鏡5、および、光検出器11の役割および仕様は実施形態1の場合と同様である。なお、波長選択透過フィルター20は溶液セル27から散乱してくる制御光が光検出器22に入射するのを防ぐものであり、実施形態1で用いたのと同様のものを用いることができる。

【0124】色素としては実施形態1と同様にテトラ(t-ブチル)銅フタロシアニンを用い、クロロホルム溶液を溶液セル27に充填して試験した。色素濃度については、光路長の相違、すなわち実施形態1の場合の光路長50  $\mu\text{m}$ に対して200倍の光路長1 cmであることを勘案し、実施形態1の場合の200分の1の濃度( $2.5 \times 10^{-5} \text{ mol/l}$ )に設定し、実効的な透過率が実施形態1の場合と同等になるよう調節した。実施形態1の場合と同様に、NDフィルター3によって、光

学素子（溶液セル27）へ入射する制御光のパワーを0.5 mWないし25 mWの範囲で調節し、制御光をシャッター4を用いて明滅させた。しかしながら、制御光のパワーを最大にしても光検出器22へ入射する信号光の強度は全く変化しないという結果が得られた。すなわち、制御光のパワーを0.5 mWないし25 mWの範囲で調節した限りでは、図13の装置構成・装置配置において光・光制御は実現できなかった。

【0125】【実施形態3】実施形態1におけるテトラ(t-ブチル)銅フタロシアニンの代わりに、色素として、テトラ(t-ブチル)オキシバナジウムフタロシアニンを用いた。他は実施形態1に記載の方法と同様にして、石英ガラス製光学セル8に液状の光応答性組成物を充填した。この場合の透過率スペクトルを図14に示す。この膜の透過率は制御光の波長(633 nm)で3.4%、信号光の波長(780 nm)で78%であった。

【0126】この膜型光学素子を実施形態1の場合と同様な光制御装置（図1）に取り付け、制御光および信号光の収束ビーム径が最小となる位置（焦点Fc）と光学セル8の位置関係を変えながら、制御光の断続に対応した信号光の光応答の向きおよび大きさを実施形態1の場合と同様にして調べた。ただし、信号光の光源2として半導体レーザー（発振波長780 nm、連続発振出力6 mW、ビーム整形後の直径約8 mmのガウスビーム）を、制御光の光源1としてヘリウム・ネオンレーザー（発振波長633 nm、ビーム直径2 mmのガウスビーム）

ム)を、集光レンズ7として倍率20倍、開口数0.4の顕微鏡用レンズを、受光レンズ9として倍率10倍、開口数0.3の顕微鏡用対物レンズを用い、集光レンズ7および受光レンズ9の間隔( $d_{78}+d_{89}$ )を固定したまま、光学セル8と集光レンズ7の距離を変化させ、同一の光路で収束された制御光および信号光の焦点位置と光学セル8との位置関係を変化させて行った。

【0127】制御光の入射パワー5mWのとき、信号光強度が減少する向きの応答の大きさ $\Delta T$ の最大値は82%、見かけの信号光強度が増加する向きの応答の大きさ $\Delta T'$ の最大値は54%であった。

【0128】【実施形態4】図15には実施形態4の光制御装置の概略構成が示されている。このような光学装置構成および配置は、図15に例示するような内部形態が薄膜型の光学セル8の他に、外部および外部形態が板状、直方体状、円柱状、半円柱状、四角柱状などの光学セルを用いる場合にも好適に用いることができる。

【0129】光源1および2、NDフィルター3、シャッター4、光検出器11および22、光学セル8、波長選択透過フィルター20、およびオシロスコープ100については実施形態1(図1)と同様のものを同様にして用いた。

【0130】図15に示すような配置でダイクロイックミラー21を用いることで、制御光を分割して、その光強度を光検出器11でモニターすると同時に、制御光と信号光の光路を重ね合わせることができ、図1の配置で必要な光混合器6を省略することができる。ただし、図15の配置においては、ダイクロイックミラー21の波長選択透過および反射を補完するために、信号光を完全に遮断し制御光だけを透過させるような波長選択透過フィルター10を光検出器11の前に設けることが好ましい。また、信号光および/または制御光が光源1および2へ戻り、光源装置に悪影響を与えるのを避けるため、必要に応じて、光アイソレーター13および14を、それぞれ光源1および2の前に設けても良い。

【0131】光路を一致させた信号光および制御光を一緒に収束させて光学セル8へ照射する際の光収束手段として、集光レンズ7および受光レンズ9の代りに、図15のような配置において凹面鏡15および16を用いることができる。信号光と制御光に共通の収束手段としてレンズを用いる場合、厳密には波長によって焦点距離が異なるという問題が生じるが、凹面鏡ではその心配がない。

【0132】図15に例示するような、本発明の光制御装置において前記光学素子を透過した後、発散していく信号光光線束のうち、前記強度変調および/または光束密度変調を強く受けた領域の信号光光線束を分別して取り出すには、次のような方法を採用することができる。

【0133】(1)光検出器22の手前に絞り19を設ける方法。

【0134】(2)照射側の凹面鏡15の開口角よりも受光側の凹面鏡16の開口角を小さくする方法。

【0135】(3)照射側の凹面鏡15の開口角よりも受光側の凹面鏡16の開口角を小さくし、更に、光検出器22の手前に絞り19を設ける方法。

【0136】図15に例示するような、本発明の光制御装置において必須の装置構成要素は光源1および2、ダイクロイックミラー21、波長選択透過フィルター20、凹面鏡15、16、および光学セル8である。なお、図15におけるダイクロイックミラー21の代りに偏光または非偏光のビームスプリッターを用いることもできる。

【0137】本発明の光制御方法を図15に示すような装置で行う場合の手順として、まず、制御光(光源1)と信号光(光源2)の光路が一致し、共通の焦点Fc(ビームウエスト)位置に光学素子8が配置されるよう調節を行い、次いで、ダイクロイックミラー21ならびに波長選択透過フィルター10および20の機能を点検するため、光源1と2を交互に点灯し、光源1のみ点灯(シャッター4開放)したとき光検出器22に応答がないこと、および光源2のみを点灯したとき光検出器11に応答がないことを確認した。

【0138】以下、実施形態1の場合と同様にして、前記光学セル8を用いた光・光制御方法を実施し、実施形態1の場合と同等の実験結果を得た。

【0139】

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明の光制御方法および光制御装置によれば、例えば、可視領域にあるレーザー光を制御光として、近赤外線領域にある信号光を効率良く変調する事が、極めて単純な光学装置によって、電子回路などを一切用いることなく、実用上充分な応答速度において実現可能になる。

【0140】更に、液状の光応答性組成物を光学セルに充填して使用することにより、光学散乱を小さくすることができ、できる限り小さいパワーで大きな光応答を示す光学装置を提供することができる。

【0141】更に、揮発性の溶剤を用いて液状の光応答性組成物を作成することによって、過大パワーの制御光が入射した場合は、前記溶剤が沸騰して泡を発生し、その結果制御光を遮断し、光学素子が損傷を受けることを防ぐようにすることができる。

【0142】光応答性組成物中に照射された制御光の焦点近傍の色素が劣化しても、拡散による物質移動によって、光応答性組成物が液状でない場合に比べて長期間、機能を発揮させることができる。

【0143】光学セル中の光応答性組成物の交換を、簡便に実施することができる。

【0144】光学セルに制御光および信号光を各々収束させる前記収束手段、および/または、光学セル中の光応答性組成物を透過した後、発散していく信号光光線束

のうち、強度変調および／または光束密度変調を強く受けた領域の信号光光線束を分別して取り出す手段、および／または、光学セル中の前記光応答性組成物を透過してきた信号光と制御光の混合光を、信号光と制御光とに分離する手段を組み込むことによって、極めてシンプルかつコンパクトな光制御装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明を実施する際に用いられる装置構成を例示した実施形態1の構成図である。

【図2】 光学ガラスまたは石英ガラス製光学セルを例示した模式図である。

【図3】 組立式光学セルの構成部品を例示した模式図である。

【図4】 実施形態1の光応答性組成物を充填した光学セルの透過率スペクトルである。

【図5】 制御光および信号光の光強度時間変化を例示した図である。

【図6】 制御光および信号光の光強度時間変化を例示した図である。

【図7】 光強度分布測定に用いたスリットと光ビームとの関係を示す図である。

【図8】 信号光のビーム断面の光強度分布を表した図である。

【図9】 信号光のビーム断面の光強度分布を表した図である。

【図10】 信号光のビーム断面の光強度分布を表した図である。

【図11】 集光レンズなどで収束されたガウスビームの焦点近傍における様子を表した模式図である。

【図12】 制御光および信号光の光路（および光軸）の関係を例示した図である。

【図13】 従来技術で用いられている装置構成を例示した構成図である。

【図14】 実施形態3の光応答性組成物を充填した光学セルの透過率スペクトルである。

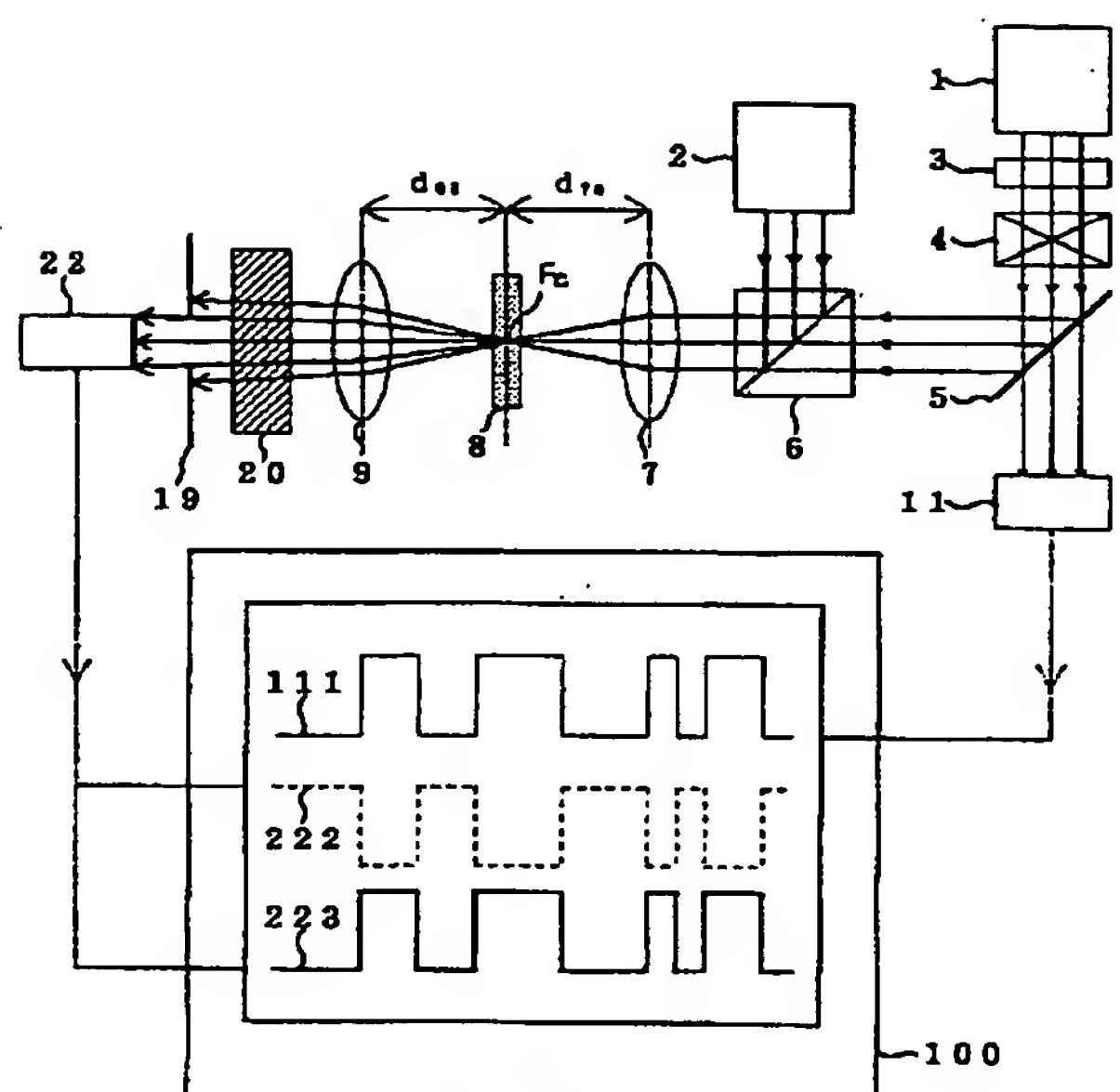
【図15】 本発明を実施する際に用いられる実施形態4の装置構成を例示した構成図である。

【符号の説明】

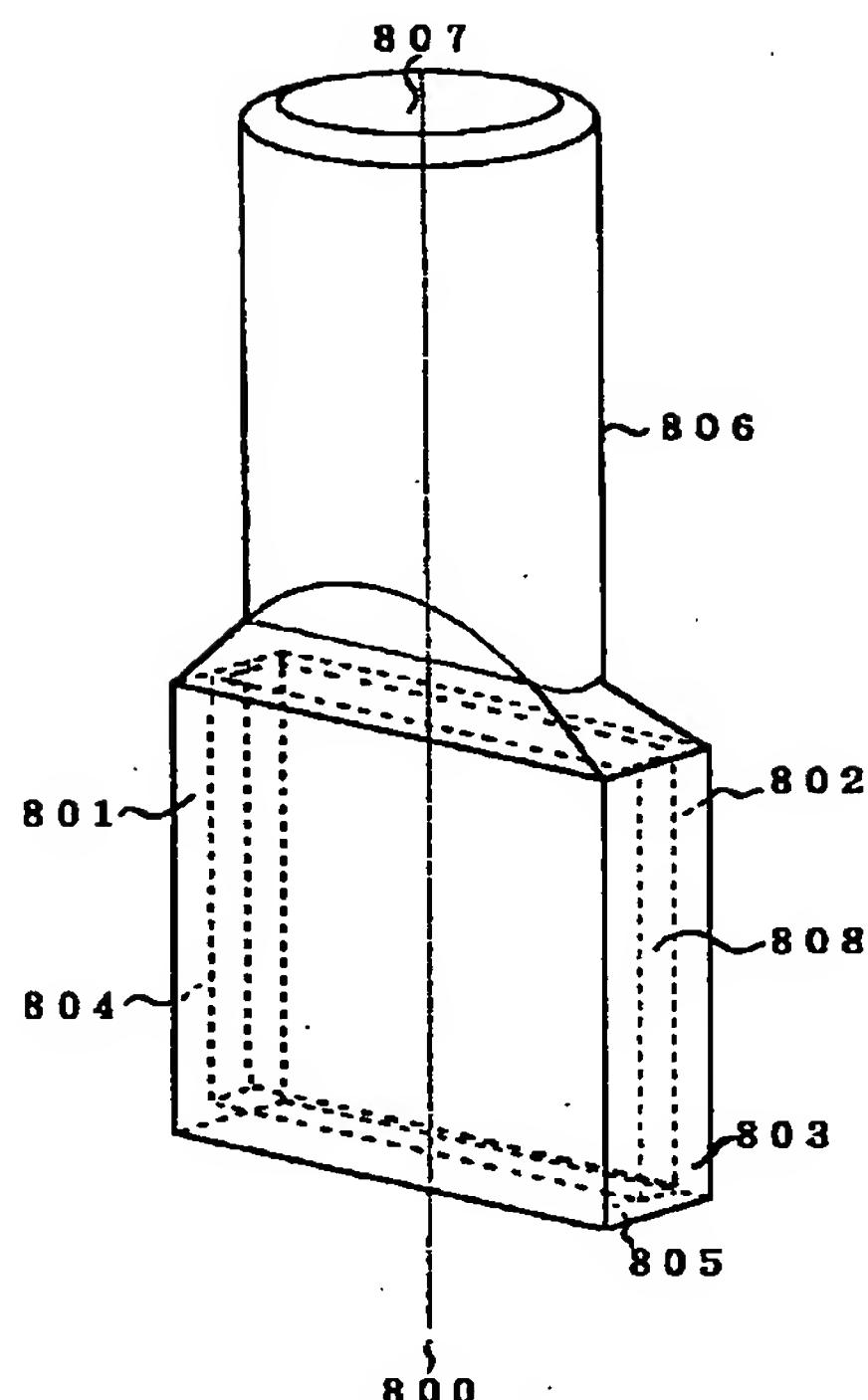
1 制御光の光源、2 信号光の光源、3 NDフィルター、4 シャッター、5 半透過鏡、6 光混合器、7 集光レンズ、8 液状の光応答性組成物を充填した光学セル、9 受光レンズ、10 波長選択透過フィルター（信号光遮断用）、11 光検出器、13 光アイソレーター（制御光用）、14 光アイソレーター（信号光用）、15 凹面鏡、16 凸面鏡、19 絞り、

20 波長選択透過フィルター（制御光遮断用）、21 ダイクロイックミラー、22 光検出器（信号光の光強度検出用）、26 投射レンズ、27 石英製溶液セル（光路長1 cm）、30 波面、31 光強度分布測定器の受光部（有効直径4 mm）、32 第一のスリット（幅1 mm）、33 第二のスリット（幅25  $\mu$ m）、100 オシロスコープ、111 光検出器11からの信号（制御光の光強度時間変化曲線）、222および223 光検出器22からの信号（信号光の光強度時間変化曲線）、800 ガラス製光学セル、801 入射・出射面ガラス、802 入射・出射面ガラス、803 側面ガラス、804 側面ガラス、805 底面ガラス、806 導入管、807 導入口、808 液状光応答性組成物充填部、810 組立式光学セル、811 固定枠、812 ゴムパッキン、813 入射・出射面ガラス、814 スペーサー、815 入射・出射面ガラス（導入孔付）、816 ゴムパッキン（導入孔付）、817 固定枠（導入管付）、818 液状光応答性組成物充填部、819 導入孔、820 導入孔、821 導入孔、822 導入管、823 導入管、824 固定ネジ穴、825 固定ネジ穴、A 制御光を遮断した状態で信号光の光源を点灯した場合の光検出器22の出力レベル、B 焦点Fcが光学セル8の集光レンズ側に設定された場合で、かつ信号光の光源を点灯した状態で制御光を照射した場合の光検出器22の出力レベル、C 信号光を消灯した状態の光検出器22の出力レベル、D 焦点Fcが光学セル8の受光レンズ側に設定された場合で、かつ信号光の光源を点灯した状態で制御光を照射した場合の光検出器22の出力レベル、d78 集光レンズ7と光学セル8の距離、d89 光学セル8と受光レンズ9の距離、Fc 焦点、L01、L+1、L-1およびL02 信号光または制御光の光ビーム断面、I+1およびI-1 信号光または制御光の光軸の平行移動距離、r1 信号光または制御光の光ビーム断面L01、L+1またはL-1の半径、r2 信号光または制御光の光ビーム断面L02の半径、t1 信号光の光源を点灯した時刻、t2 制御光を遮断していたシャッターを開放した時刻、t3 制御光をシャッターで再び遮断した時刻、t4 制御光を遮断したシャッターを開放した時刻、t5 制御光をシャッターで再び遮断した時刻、t6 信号光の光源を消灯した時刻、 $\theta$  集光レンズで収束させた光ビームの外周部が光軸となす角度、 $\omega_0$  集光レンズで収束させたガウスビームのビームウエスト（焦点位置におけるビーム半径）。

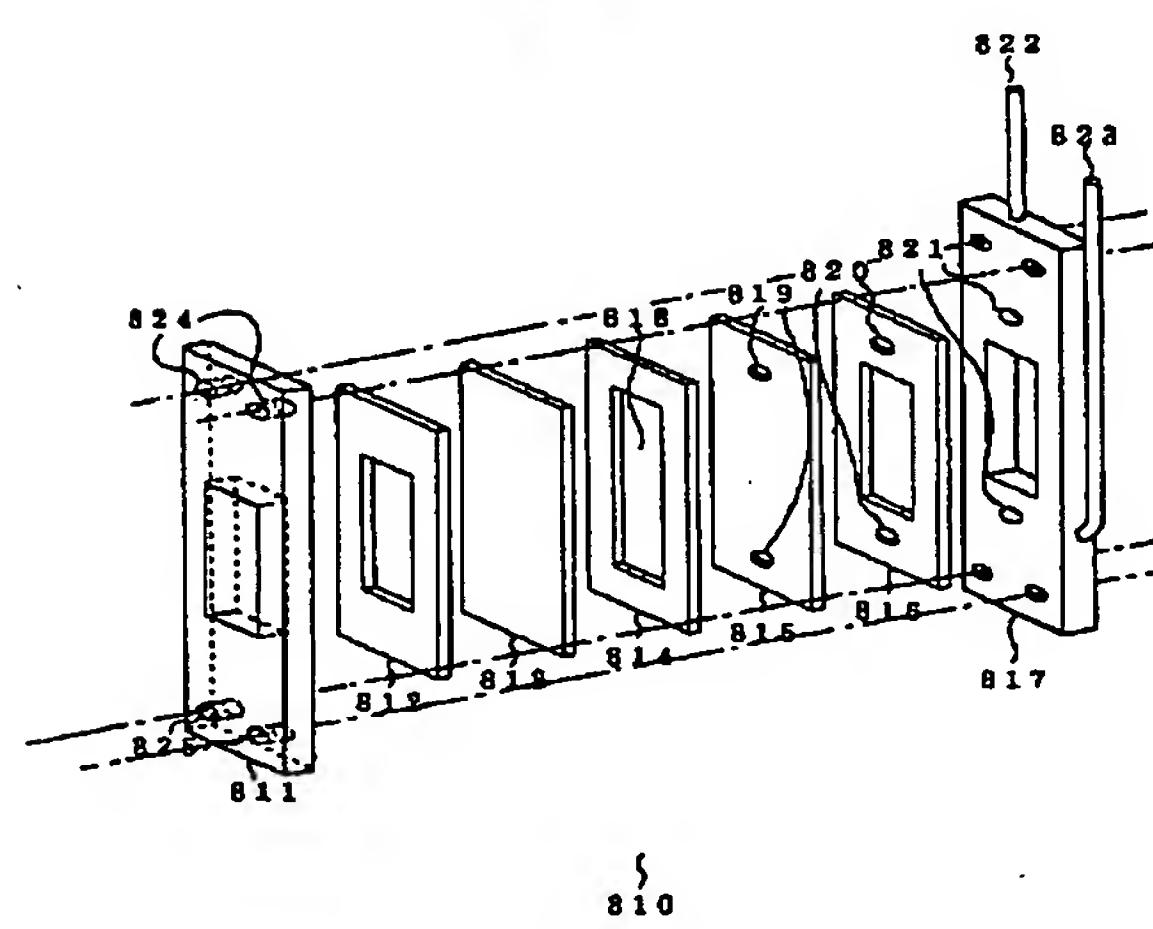
【図1】



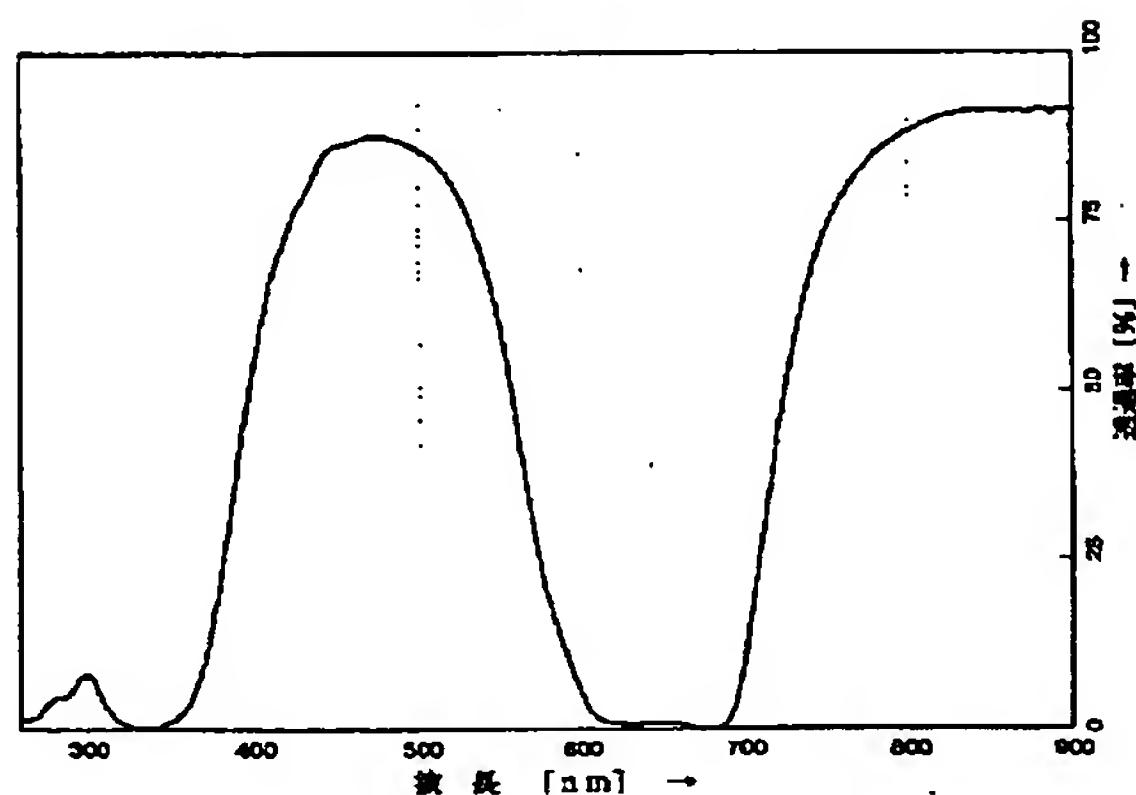
【図2】



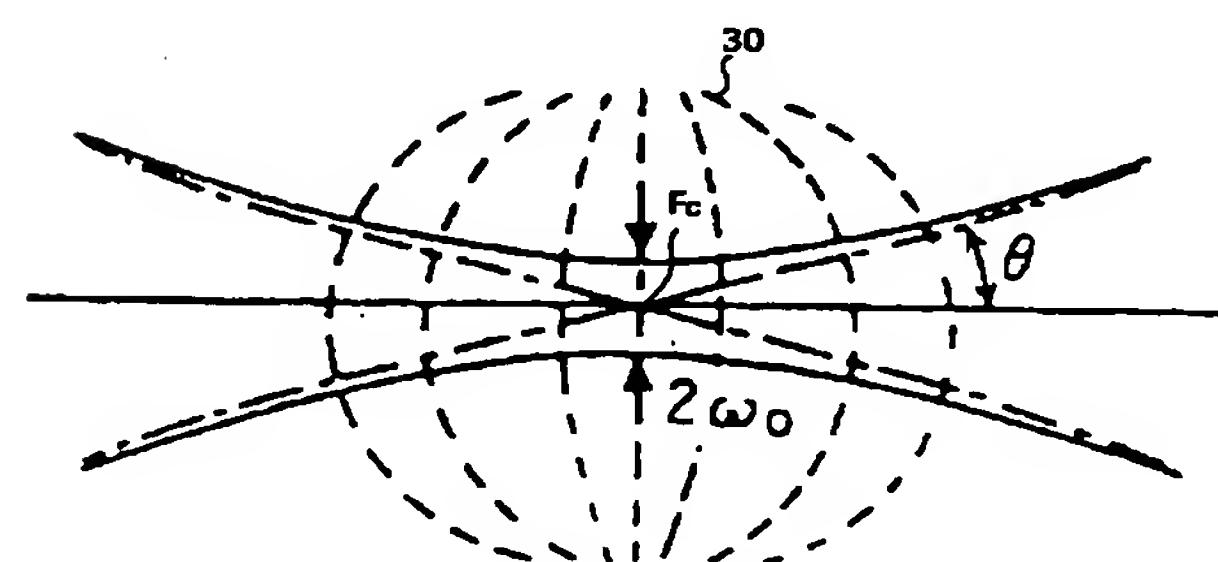
【図3】



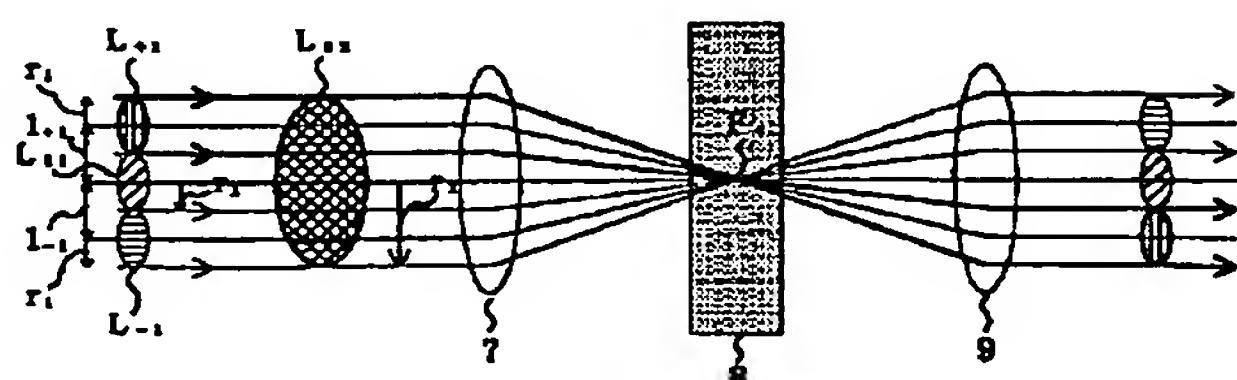
【図4】



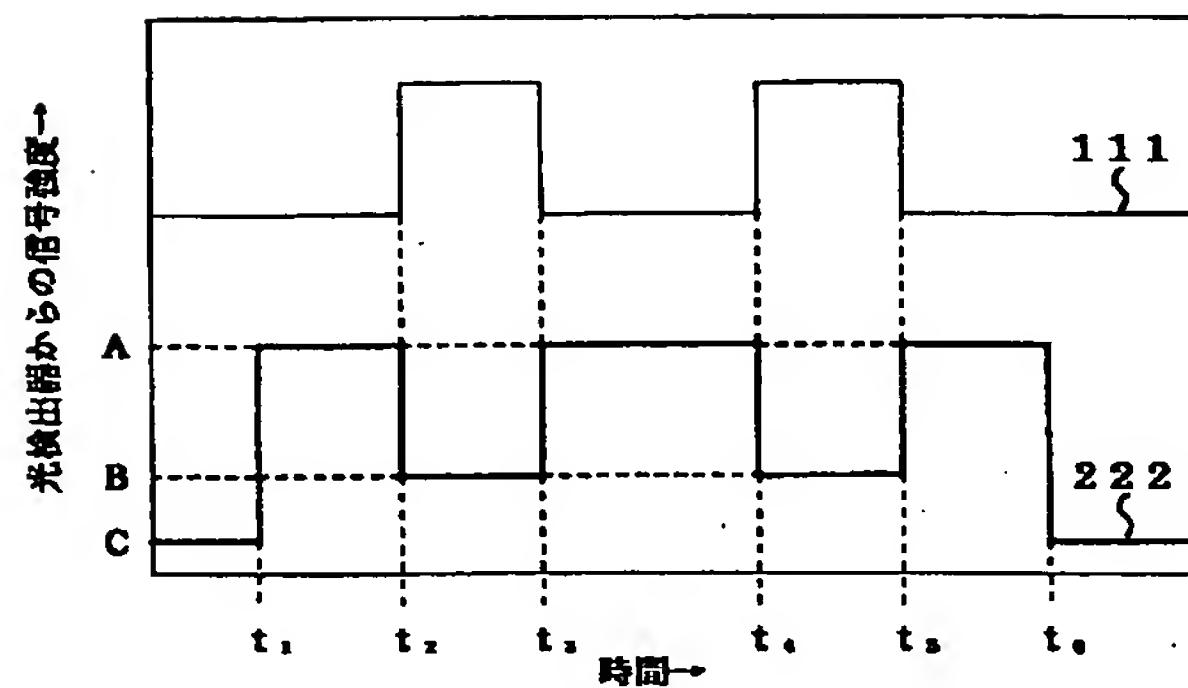
【図11】



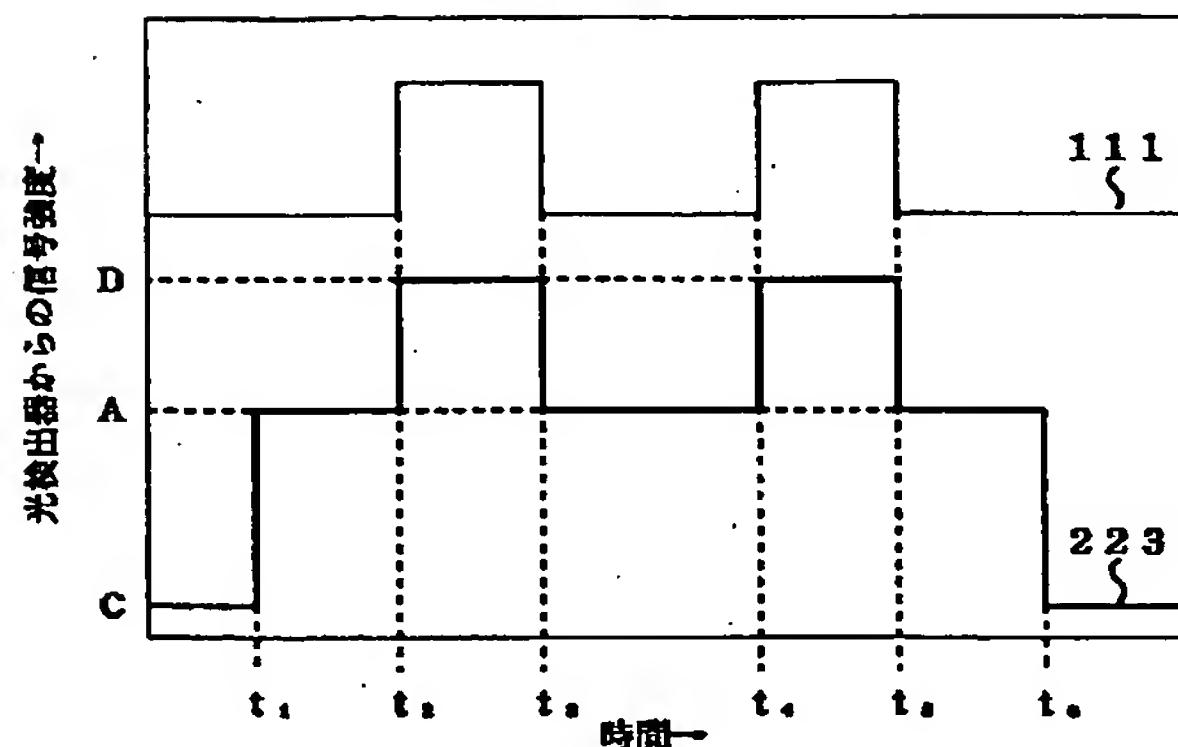
【図12】



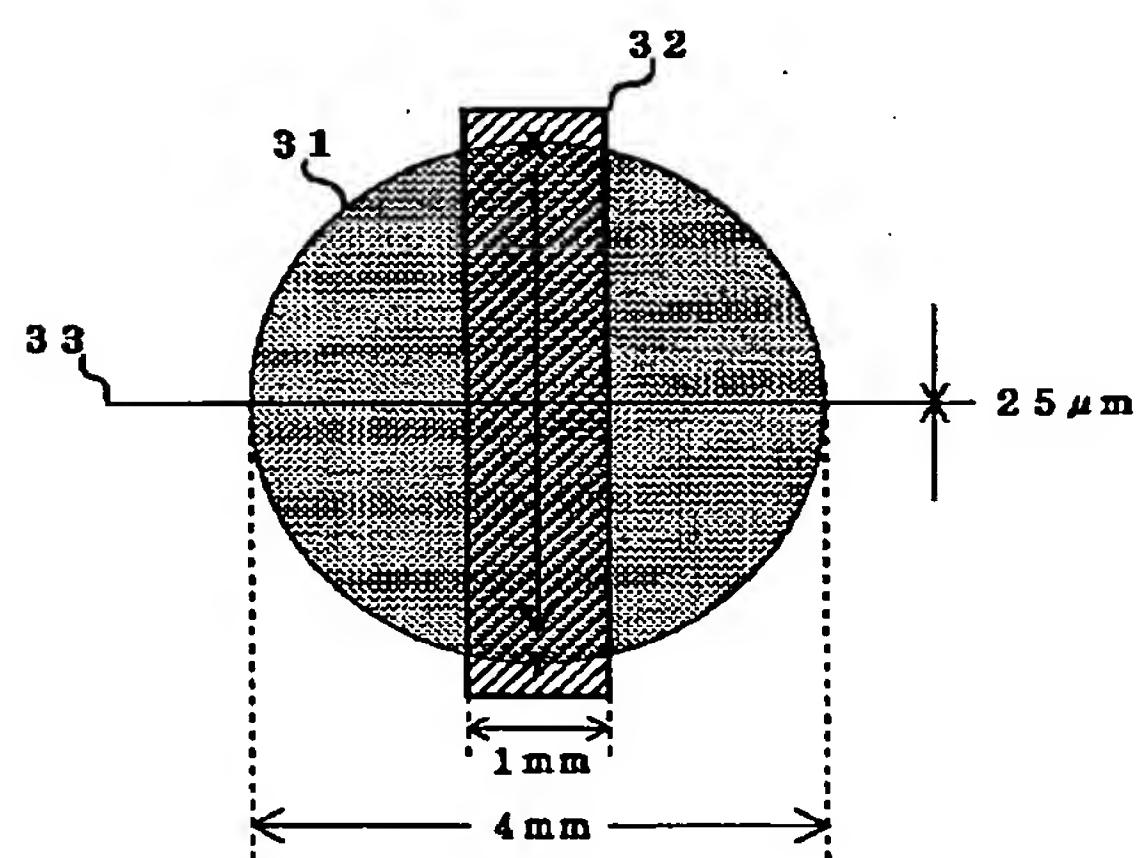
【图5】



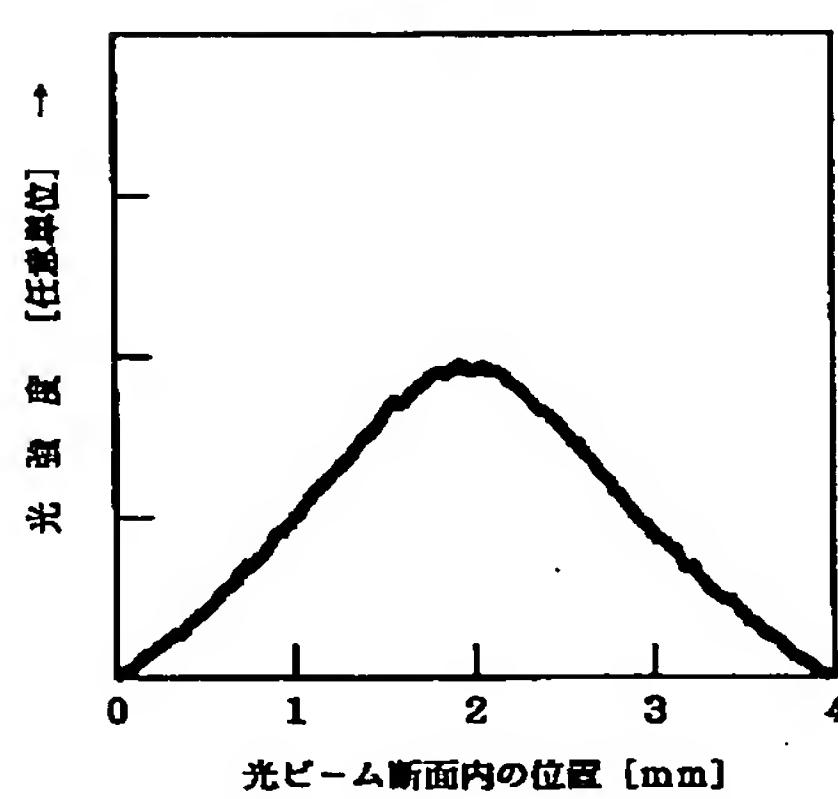
【图6】



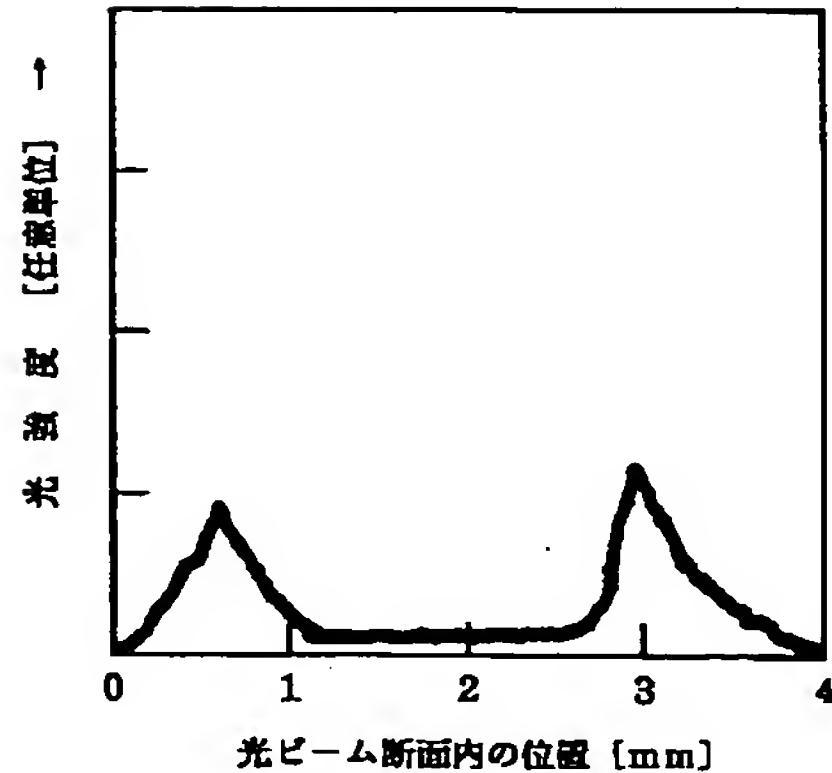
〔圖7〕



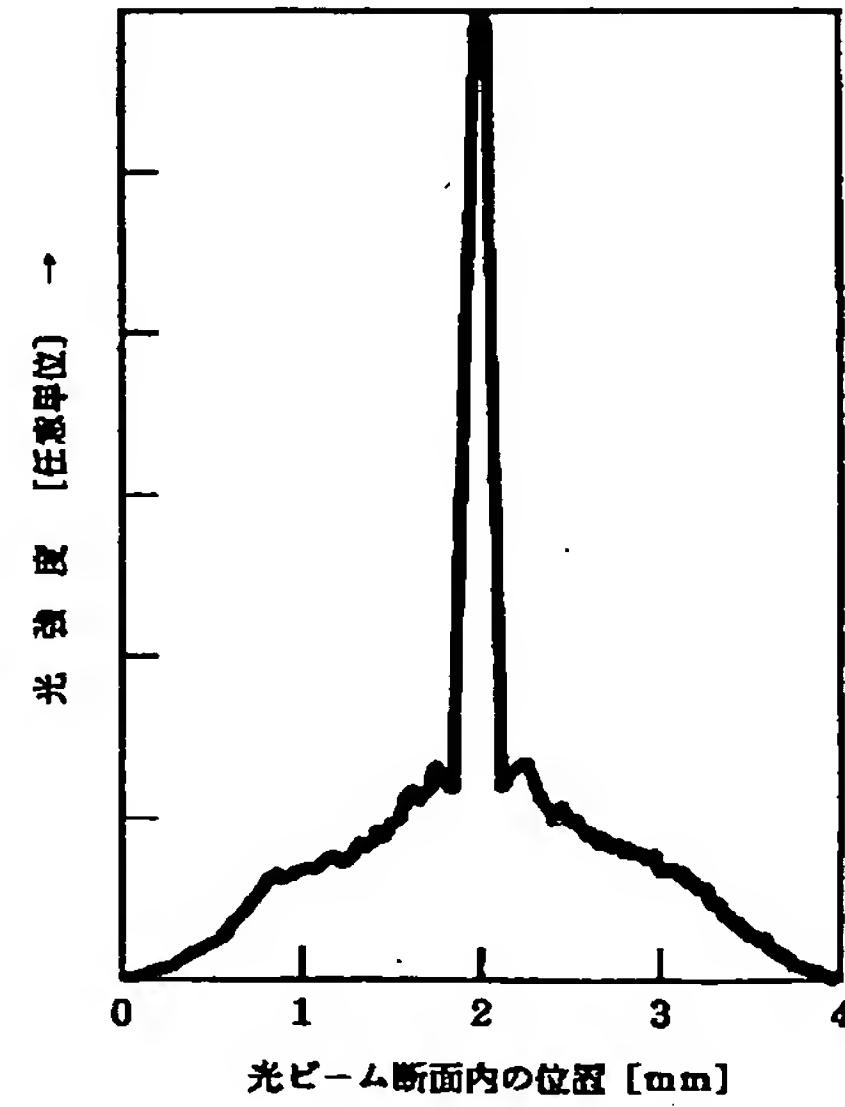
[图8]



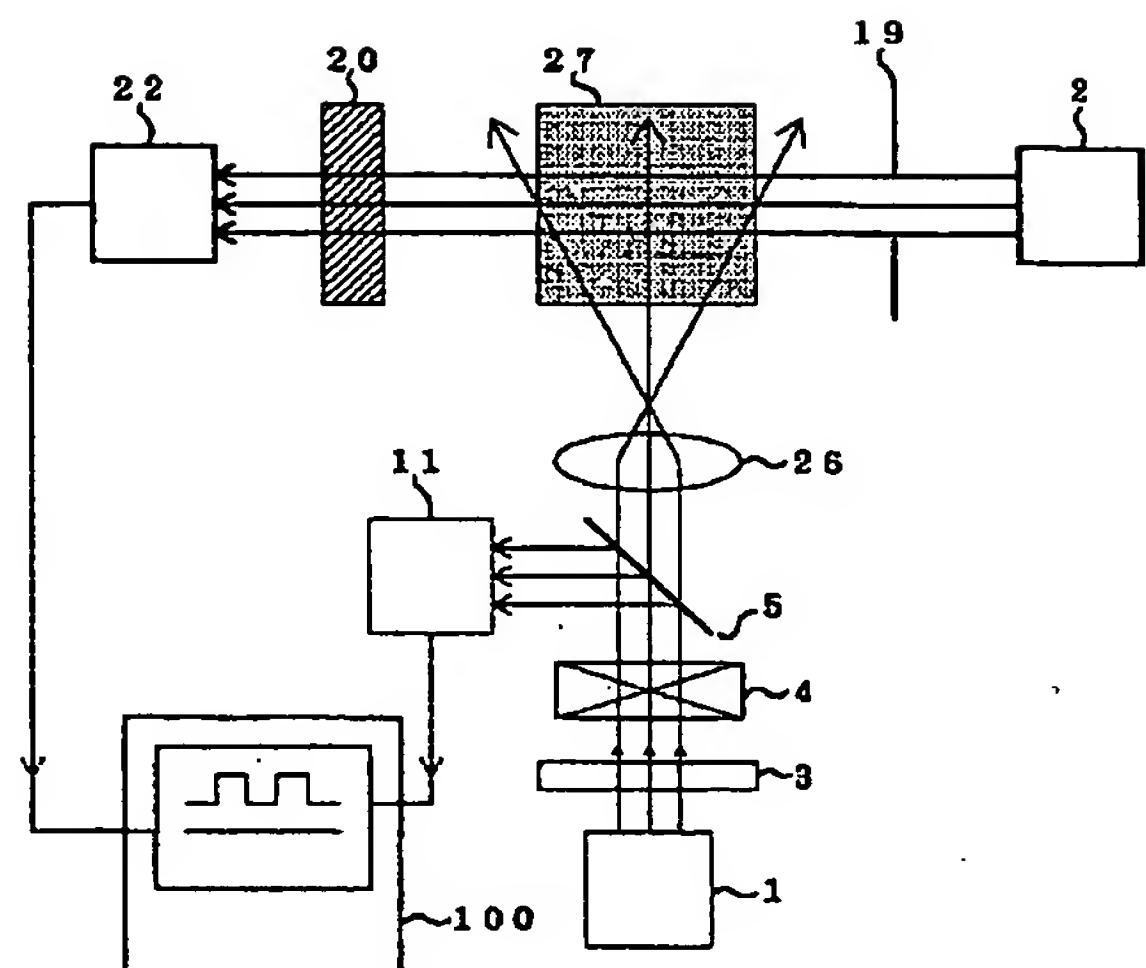
[図9]



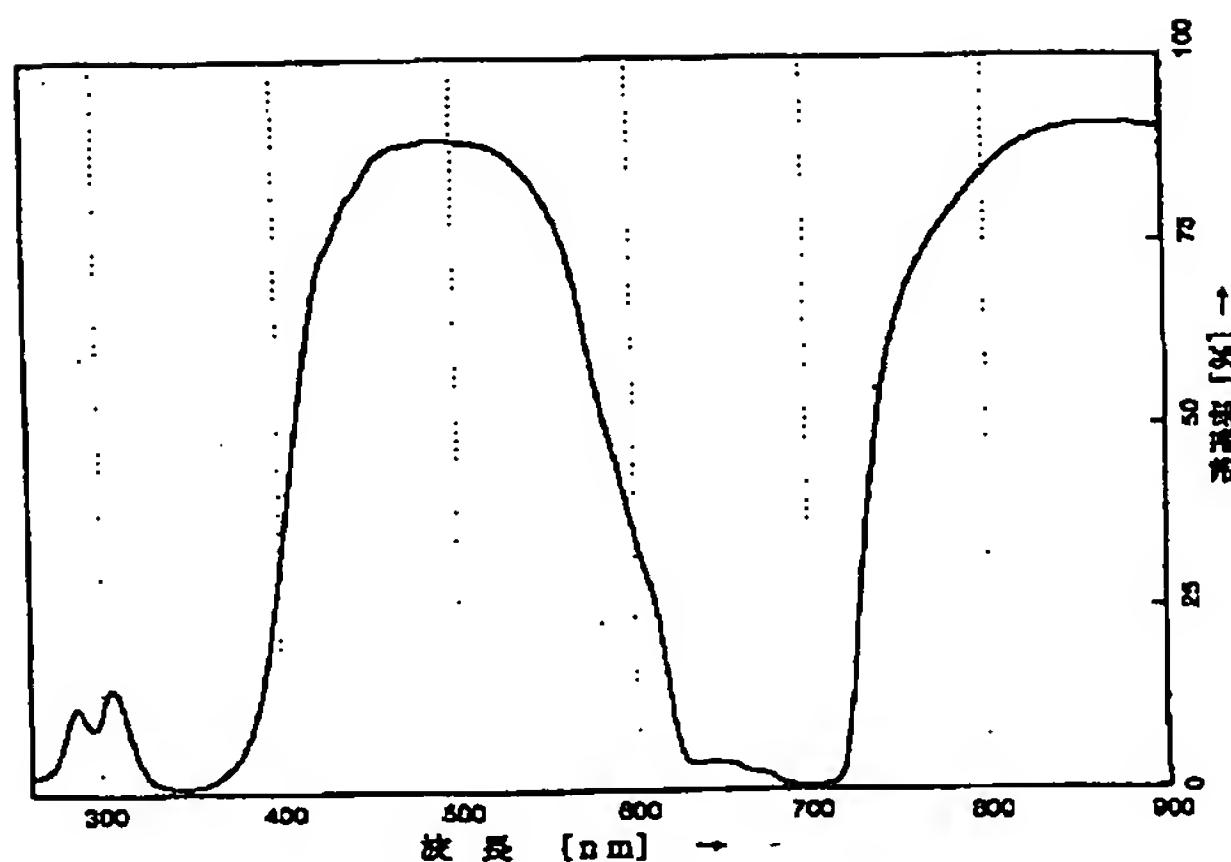
【图10】



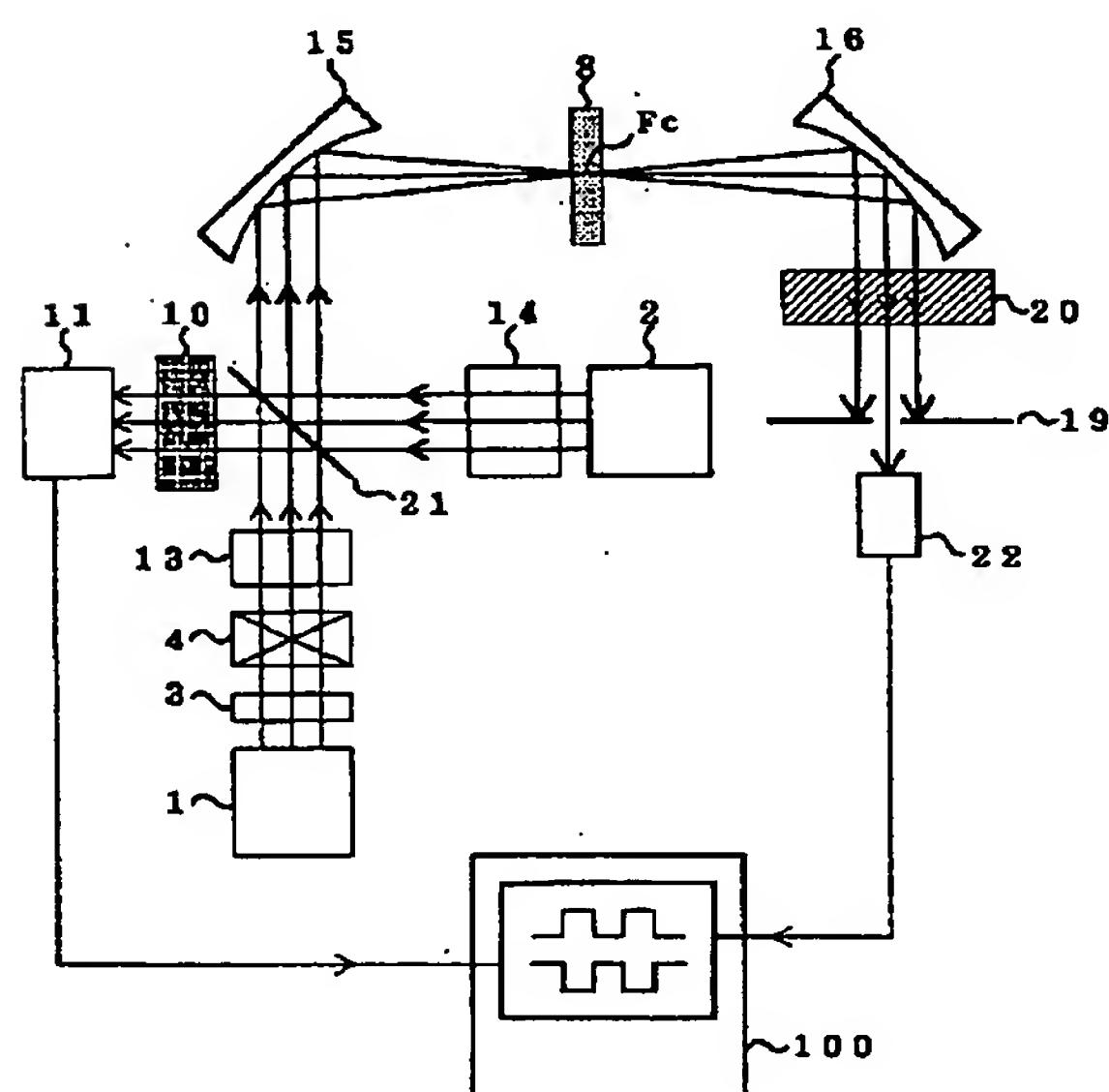
【图 13】



【图 14】



[§ 15]



## フロントページの続き

(72) 発明者 宝田 茂  
東京都足立区堀之内1丁目9番4号 大日  
精化工業株式会社東京製造事業所内

(72) 発明者 柳本 宏光  
東京都足立区堀之内 1 丁目 9 番 4 号 大日  
精化工業株式会社東京製造事業所内

(72) 発明者 甲斐 正勝  
神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番  
地 日本ピクタ一株式会社内

(72) 発明者 上野 一郎  
神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番  
地 日本ピクタ一株式会社内